



Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften

Institut für Festkörperphysik

AG Kneissl

## **Masterarbeit zum Thema**

---

**Untersuchung der optischen Polarisation und internen  
Quanteneffizienz von AlGaN Quantenfilmen mittels  
temperatur- und leistungsabhängiger  
Photolumineszenzspektroskopie**

---

*Masterarbeit*

Baran Avinc

*Gutachter*

Prof. Dr. Michael Kneissl

Prof. Dr. Axel Hoffmann

*Betreuer*

Christoph Reich

Bettina Belde

22. Oktober 2018

---

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Die selbstständige und eigenständige Anfertigung versichert an Eides statt.

Berlin, den 22. Oktober 2018

-----

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung</b>	<b>5</b>
<b>2 Grundlagen</b>	<b>9</b>
2.1 Bandstruktur von Gruppe-III Nitriden . . . . .	9
2.2 Wurtzitstruktur . . . . .	10
2.3 Polarisationsfeld und QCSE in III/V Halbleitern . . . . .	11
2.4 Metallorganische Gasphasenepitaxie von AlGaN . . . . .	13
2.5 Substrat . . . . .	13
2.6 Reduktion der Versetzungsichte durch ELO/AlN-Saphir . . . . .	15
2.7 Rekombinationsmechanismen . . . . .	15
2.8 Bestimmung der internen Quanteneffizienz . . . . .	20
2.9 Bestimmung der IQE bei Raumtemperatur durch Fitting . . . . .	21
2.10 Optische Polarisation und Valenzbandstruktur . . . . .	23
<b>3 Aufbau</b>	<b>29</b>
3.1 Photolumineszenzaufbau . . . . .	29
3.2 Messaufbau Lichtpolarisation . . . . .	31
3.3 Bestimmung der Degradation des UV Quarzglases . . . . .	32
3.4 Erweiterung der Filterkombinationen . . . . .	34
<b>4 Einfluss der Auger-Rekombination auf die IQE</b>	<b>37</b>
<b>5 Untersuchung des MQW-Designs von AlGaN-UVC-Heterostrukturen</b>	<b>41</b>
5.1 Einleitung . . . . .	41
5.2 Ergebnisse . . . . .	42

## INHALTSVERZEICHNIS

---

5.3	Einfluss der Siliziumdotierung auf die IQE . . . . .	46
5.4	Ergebnisse der Simulationen . . . . .	48
5.5	Zusammenfassung . . . . .	48
<b>6</b>	<b>Untersuchung optisch gepumpter Laserstrukturen auf unterschiedlichen Templates</b>	<b>51</b>
6.1	Einleitung . . . . .	51
6.2	UVC-Laser Strukturen auf ELO ohne Übergitter . . . . .	54
6.3	UVC-Laser Strukturen auf ELO mit Übergitter . . . . .	60
6.4	Zusammenfassung . . . . .	66
<b>7</b>	<b>Untersuchung der optischen Polarisation an AlGaN MQWs mit Photolumineszenzspektroskopie</b>	<b>69</b>
7.1	Einleitung . . . . .	69
7.2	Variation des Al-Gehalts in den QWs . . . . .	69
7.3	Variation der QW-Dicke . . . . .	71
<b>8</b>	<b>Bestimmung der IQE bei Raumtemperatur</b>	<b>73</b>
<b>9</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>75</b>
<b>10</b>	<b>Danksagung</b>	<b>77</b>

# Kapitel 1

## Einleitung

This year's Nobel Laureates are rewarded for having invented a new energy-efficient and environment-friendly light source – the blue light-emitting diode (LED). In the spirit of Alfred Nobel the Prize rewards an invention of greatest benefit to mankind; using blue LEDs, white Light can be created in a new way. [1]

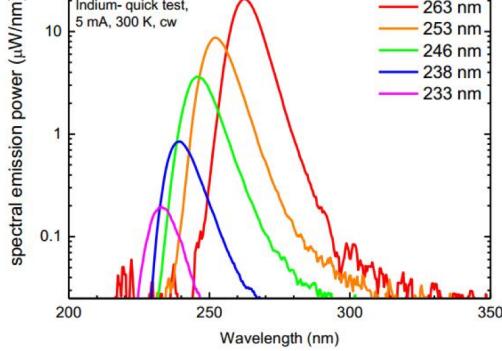
Dieser Satz, den die Schwedische Akademie der Wissenschaft nach der Vergabe des Nobelpreises an die Entwicklung der blauen LED (kurz, light emitting diode) im Jahr 2014 an die Presse veröffentlichte, fasst treffend zusammen, wie hoch die Bedeutung der auf Halbleiterkristallen basierenden optischen Bauelemente ist [2]. LEDs nehmen einen fundamentalen und immer bedeutender werdenden Teil unseres alltäglichen Lebens ein. Ausgezeichnet durch ihre hervorragende Effizienz, konkurrenzlosen Lebensdauer und geringen Dimension übernimmt sie durch eine immer höher werdende Lichtausbeute zusehends neue Anwendungsbereiche. Insbesondere auf Galliumnitrid (GaN) basierende Halbleitermaterialien haben einen bahnbrechenden Weg hingelegt, der zur Entwicklung von hoch effizienten und leuchtstarken blauen LEDs führte und ebenfalls Grundlage für die Entwicklung in andere hochenergetische Wellenlängenbereiche darstellt [3] [4] [5]. So ebnet GaN auch den Weg für die Erzeugung von ultraviolettem emittierenden Leuchtdioden. Der ultraviolette Spektralbereich, der sich in den UV-A (400 nm bis 320 nm), UV-B (320 nm bis 280) und UV-C Bereich (280 nm bis 200 nm) unterteilt, ist bedeutend für eine sehr hohe Anzahl spezieller Anwendungsbereiche. Beispielsweise

---

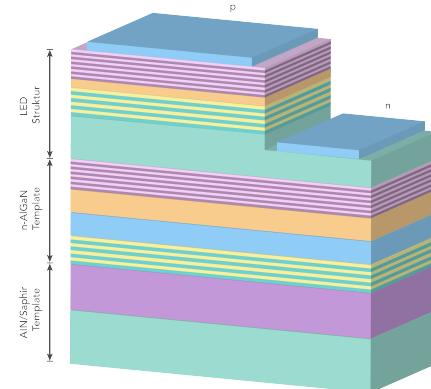
## KAPITEL 1. EINLEITUNG

---

bieten sich UV-LEDs an, um die bisher für Wasseraufbereitung genutzten Quecksilberdampflampen zu ersetzen [6] [?]. Bislang werden für deren Betrieb Hochspannungsnetzteile verwendet, die einen mobilen Einsatz erheblich erschweren können. Hier bietet sich die Möglichkeit Abhilfe durch UV-LEDs zu verschaffen, da diese durch ihr kleines Format und durch die niedrigen Betriebsspannungen einen mobilen Einsatz ermöglichen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die industrielle Aushärtung/Aufbrechung von Lacken und die Gasdetektion [7] [8]. Für alle die-



**Abbildung 1.1:** Spektrale Emissionsleistung für 5 verschiedene Wellenlängen von 263 nm bis 233 nm. Die Grafik zeigt, dass die spektrale Emissionsleistung mit sinkender Wellenlänge ebenfalls sinkt [9].



**Abbildung 1.2:** Aufbau einer LED-Heterostruktur mit vielen Schichten die unterschiedlichen Zwecken dienen.

se Anwendungsbereiche ist eine hohe Ausgangsleistung notwendig. Aber wie in Abbildung 1.1 zu sehen ist, sinkt die spektrale Emissionsleistung mit kleiner werdenden Wellenlängen signifikant. Der Grund dafür ist, dass UV-LEDs bisher an einer geringen Effizienz unterliegen, die quantitativ als Externe Quanteneffizienz (EQE) ausgedrückt wird und sich aus dem Produkt der internen Quanteneffizienz (IQE), Extraktionseffizienz (EE) und Injektionseffizienz (INJ) zusammensetzt:

$$EQE = IQE \cdot EE \cdot INJ \quad (1.1)$$


---

Die Gründe für die geringe Effizienz sind vielfältig. LEDs bestehen aus einer Vielzahl an Schichten (Abb. 1.2), die unterschiedlichen Funktionen dienen. Diese Schichten werden auf Substraten aufgewachsen. Eine hohe Substratqualität ist also der Grundbaustein für die optischen Eigenschaften und damit besonders entscheidend. Denn eine geringe Defektdichte im Substrat geht einher mit einer ebenfalls geringen Defektdichte in den aufgewachsenen Schichten und damit insbesondere der aktiven Zone, in der Elektronen und Löcher rekombinieren und Licht emittiert wird. Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit den geringen Defektdichten ist ein Mangel an geeigneten Substratmaterialien. So wird aufgrund des Mangels an AlN-Substraten, beruhend auf den Preis der Herstellung, auf Saphir Substrate ausgewichen. Diese sind im fernen UV transparent und zusätzlich in großen Mengen in guter Qualität herstellbar. Problematisch jedoch ist die hohe Gitterfehlspannung durch die relativ großen Unterschiede zwischen den Gitterkonstanten von AlN/GaN und Saphir. Durch diese sind AlN- und AlGaN-Schichten nicht vollverspannt aufwachsbar. Das führt dazu, dass die Schichten relaxieren, weil die Elastizität der Schicht nicht groß genug im Vergleich zur Verspannungsenergie ist. Die Relaxation führt zur Entstehung von Versetzungen und Rissen. Die Versetzungen agieren im Kristall als sogenannte nicht-strahlende Rekombinationszentren, welche die IQE verringern. Die Hauptthematik dieser Arbeit liegt in der Bestimmung der IQE von AlGaN - Heterostrukturen mit hohem Al-Gehalt mit Hilfe von temperatur- und leistungsdichteabhängigen Photolumineszenzmessungen. So lässt sich bei der Annahme, dass bei Tieftemperatur keine nicht-strahlende Rekombination stattfindet, die IQE als Quotient der Intensität der Photolumineszenz bei Raumtemperatur (300K) und Tieftemperatur (5K) beschreiben. Das Kapitel 5 widmet sich der Untersuchung von AlGaN-MQWs variierenden Quantentopf(eng.: quantum well, kurz: QW)-Dicken mit dotierten und undotierten Barrieren. Mit Hilfe von temperaturabhängiger UV-Photolumineszenzmessungen soll der Einfluss der variierenden QW-Dicke und Dotierung auf die interne Quanteneffizienz und die Emissionsenergien untersucht werden. In 6 wird der Einfluss des Fehlschnittwinkels des Substrates auf die IQE untersucht. Dieser nimmt deutlichen Einfluss auf die Wachstumskinetik und somit auf die Anordnung der monoatomaren Schichten und zeigt sich insbesondere an der Oberflächenmorphologie, auf die im Kapitel mit Hilfe verschiedener Messmethoden eingegangen wird. In Kapitel 7 werden theoretische

## KAPITEL 1. EINLEITUNG

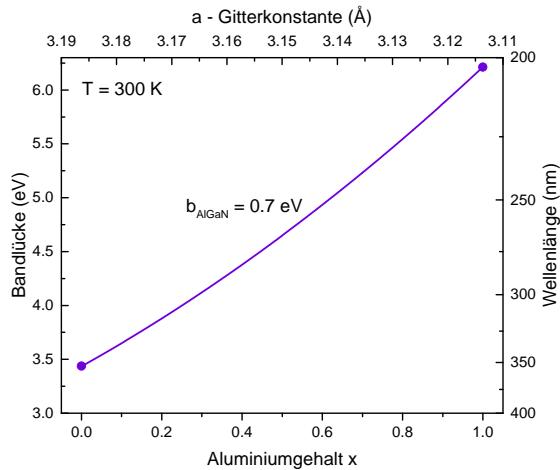
---

Simulationen der Polarisierung für AlGaN experimentell überprüft. Die Polarisierung hat bedeutenden Einfluss auf die Extraktionseffizienz (EE) und somit auf die EQE. Im Kapitel 8 der Arbeit wird eine Methode analysiert, die eine Möglichkeit beschreibt, durch leistungsdichteabhängige Messungen bei Raumtemperatur die IQE zu bestimmen. Das ist insofern ein Vorteil, dass ein aufwendiges Runterkühlen auf 5K nicht notwendig ist und auch die Basis für einen Vergleich mit der temperaturabhängigen Standardmethode liefert.

# Kapitel 2

## Grundlagen

### 2.1 Bandstruktur von Gruppe-III Nitriden



**Abbildung 2.1:** Die Bandlücke von  $Al_xGa_{1-x}N$  variiert mit dem Aluminiumgehalt  $x$  zwischen den Bandlücken von AlN ( $E_g(T = 300K) = 6,213\text{ eV}$ ) und GaN ( $E_g(T = 300K) = 3,437\text{ eV}$ ) [10]. Die Abweichung von der Linearität beschreibt der Bowing-Parameter  $b_{AlGaN} = 0,7\text{ eV}$ .

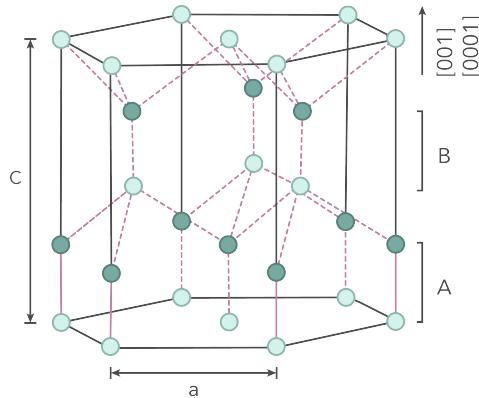
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem AlGaN-Materialsystem mit hohen Al-Konzentrationen. Das Mischverhältnis bestimmt hierbei die Bandlückenenergie des Verbindungshalbleiters. Durch die unterschiedlichen Bandlückenenergien von Aluminium mit  $6,03\text{ eV}$ [11] und GaN mit  $3,4\text{ eV}$  [10] eignet sich AlGaN besonders für die Emission im Wellenlängenbereich von UV-A bis UV-C. Die Bandlücken-

energie von AlGaN lässt sich durch Interpolation der binären Energien von GaN und AlN in Abhängigkeit des Kompositionsverhältnisses  $x$  berechnen, wobei ein zusätzlicher Bowing-Parameter für die nichtlineare Abweichung hinzugefügt wird.

$$E_{Al_xGa_{1-x}N} = E_{AlN} \cdot x + E_{GaN} \cdot (1 - x) - b_{AlGaN} \cdot x \cdot (1 - x) \quad (2.1)$$

Die Gruppe um Lee et al. gibt nach Auswertung der in der Literatur vorkommenden unterschiedlichen Bowing-Parameter für  $Al_xGa_{1-x}N$  einen Wert von  $b_{AlGaN} = 0,62 (\pm 0,45) eV$  an und ergänzt, dass hohe Wachstumstemperaturen zu großen Bowing-Parametern führen [12]. Vurgaftman et al. empfehlen unter Berücksichtigung weiterer Veröffentlichungen für  $b_{AlGaN} = 0,7 eV$ .

## 2.2 Wurtzitstruktur



**Abbildung 2.2:** Einheitzeile der hexagonalen Wurtzitstruktur. Die schwarzen Kreise stellen die Position der Stickstoffatome im Gitter dar. Die Gitterposition der Gruppe-III-Metallatome sind als graue Kreise dargestellt. A und B bezeichnen die Stapelebenen.

Die wichtige Gruppe der III-Nitridhalbleiter setzt sich aus den Metallen der dritten Hauptgruppe Aluminium (Al), Gallium (Ga) und Indium (In) zusammen. Diese kristallisieren, wie in Abbildung 3.2 zu sehen, bevorzugt in der hexagonalen Wurt-

zitstruktur. Anschaulich bedeutet dies, dass ausgehend von der hexagonal dichtensten Kugelpackung in Doppellagen, die Gruppe-III-Metalle und Stickstoff (N) sich entlang der c-Achse in der Abfolge A-B-A-B anordnen [13]. Die Einheitszelle wird durch Gitterparameter  $a$  und  $c$  bestimmt. Die Gitterkonstanten zeigen eine lineare Abhangigkeit vom Konzentrationsverhaltnis  $x$  und konnen mit dem Vegard'schen Gesetz berechnet werden.

$$\begin{aligned} a_{Al_xGa_{1-x}N} &= a_{AlN} \cdot x + a_{GaN} \cdot (1 - x), \\ c_{Al_xGa_{1-x}N} &= c_{AlN} \cdot x + c_{GaN} \cdot (1 - x) \end{aligned} \quad (2.2)$$

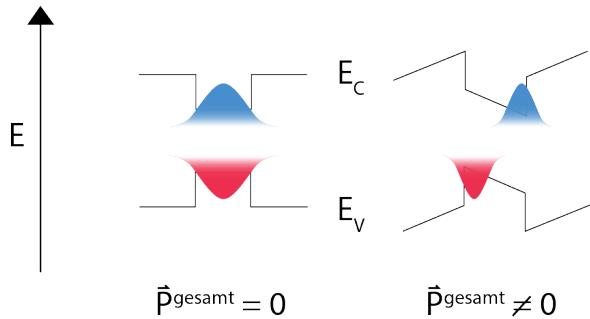
Die Tabelle 2.3 zeigt die typischen Gitterkonstanten.

Gitterkonstante	AlN[A]	GaN[A]	Saphir[A]
a	3,112	3,192	4,758
c	4,980	5,196	12,99

**Abbildung 2.3:** Ubersicht der Gitterkonstanten der binaren Halbleiter AlN, GaN und  $Al_2O_3$  (Saphir) [14].

## 2.3 Polarisationsfeld und QCSE in III/V Halbleiter

Aufgrund der fehlenden Inversionssymmetrie und stark unterschiedlichen Elektronegativitaten des Stickstoffs und der entsprechenden Gruppe III-Metalle bilden sich Polarisationsfelder aus, die entlang der auf der Basalebene stehenden c-Achse verlaufen. Hier unterscheidet man zwischen zwei Arten von Polarisationsfeldern, die spontane Polarisation  $\vec{P}^{sp}$  und die piezoelektrische Polarisation  $\vec{P}^{pz}$ . Die spontane Polarisation entsteht durch Dipolmomente im Kristall, die sich aufgrund von ungleichen Bindungslangen nicht komplett aufheben. Ursprung der Dipolmomente im AlGaN sind die unterschiedlichen Elektronegativitaten zwischen den Gruppe III-V Elementen. Bedingt durch die angestrebte Minimierung der Gesamtenergie kommt es zur Abweichung vom idealen Tetraederwinkel von  $109,5^\circ$  [15]. Die Ursache fur die piezoelektrische Polarisation sind die Verzerrungen zwischen den in (0001)-Richtung gewachsenen Schichten, welche durch die unterschiedlichen ther-



**Abbildung 2.4:** Einfluss der spontanen und piezolektrischen Polarisation auf Valenz- und Leitungsband einer Quantenfilm-Heterostruktur. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elektronen und Löchern werden verschoben.

mischen Ausdehnungskoeffizienten und die Gitterfehlanpassung beim pseudomorphen Wachstum entstehen. Sie wird berechnet nach

$$\vec{P}^{pz} = \vec{e} \cdot \epsilon \quad (2.3)$$

mit Dehnung  $\epsilon$  und dem piezolektrischen Tensor  $\vec{e}$  (Tensor dritter Stufe).

In Heterostrukturen führt der Wechsel der Gesamtpolarisation  $\vec{P}_{\text{gesamt}} = \vec{P}^{pz} + \vec{P}^{sp}$  zwischen den einzelnen Schichten zur Ansammlung von Ladungsträgern an den Grenzflächen. Dies ist insbesondere für die Effizienz von Leucht- und Laserdiode von Nachteil. Denn in diesen erzeugen die induzierten Grenzflächenladungen ein elektrisches Feld, das zu einer Bandverbiegung führt (siehe Abb. 2.4). Mit dem Einfluss der Polarisation sammeln sich die Elektronen und Löcher im Quantenfilm somit auf gegenüberliegenden Seiten. Dies führt dazu, dass der räumliche Überlapp der Wellenfunktionen von Elektronen und Löchern abnimmt. Durch das verringerte Überlappintegral der Wellenfunktionen sinkt nach Fermis Goldener Regel auch die strahlende Rekombinationsrate. Des Weiteren sinkt die effektive Bandlücke und ist im Spektrum durch eine Rotverschiebung der Emission zu erkennen. Dieser Effekt wird als "Quantum Confined Stark Effekt" (QCSE) bezeichnet. Bei hohen Ladungsträgerdichten im Quantenfilm kommt es zur Abschirmung (engl. screening) der Grenzflächenladungen, welche die Auswirkungen des QCSE abschwächen.

## 2.4 Metallorganische Gasphasenepitaxie von AlGaN

Die Metallorganische Gasphasenepitaxie (engl.: metalorganic vapor phase epitaxy, kurz MOVPE) ist die gängigste Methode um epitaktische Schichten hoher Qualität in ebenfalls hoher Quantität zu wachsen. Es werden gasförmige Ausgangsstoffe in den Reaktor geleitet und dort bei hohen Temperaturen pyrolytisch zerlegt. Ein Teil der derartig zerlegten Ausgangsstoffe adsorbiert auf der Oberfläche des verwendeten Substrates und kristallisiert dort schließlich als Epitaxieschicht.

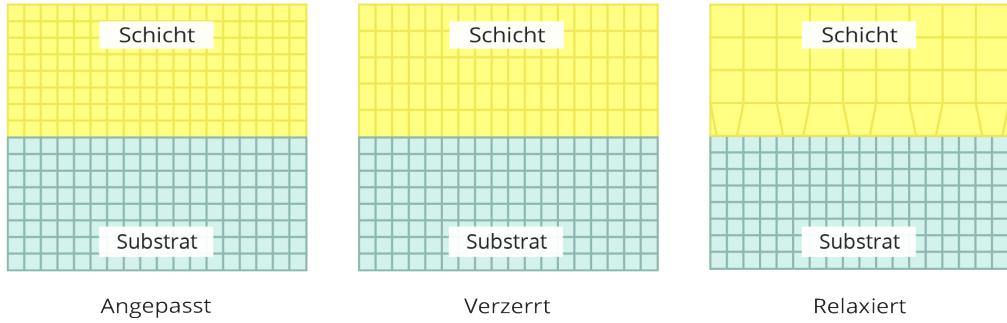
## 2.5 Substrat

In der Epitaxie beruhen viele Eigenschaften der aufgewachsenen Schichten auf dem dazu verwendeten Substrat. So sind Gitterfehlanpassung, Versetzungsdichte und die Morphologie wichtige Eigenschaften, die durch das Substrat maßgeblich beeinflusst werden. Für AlGaN kann theoretisch auf verschiedene Substrate zurückgegriffen werden und die Vermutung direkt AlGaN basierte Substrate zu verwenden liegt nahe. Dies scheitert allerdings an der besonders hohen Schwierigkeit bei der Herstellung. Daraus resultierend weisen diese Substrate hohe Versetzungsdichten auf und sind mit sehr hohen Kosten verbunden. Weiterhin ist GaN/Saphir oder GaN als Volumenkristall kommerziell in großen Mengen und hoher Qualität erhältlich, aber aufgrund der Gitterfehlanpassung zwischen AlN und GaN reißen AlGaN-Schichten mit hohem Aluminiumgehalt auf GaN wegen Relaxation [16] wie in Abbildung 2.5 dargestellt. Ein weiterer ungewollter Effekt ist die Absorption von UV-Strahlung ( $\lambda \leq 365 \text{ nm}$ ) im GaN und erlaubt damit keine Verwendung im UV-B und UV-C-Bereich. Daher werden UV-B- und UV-C LEDs und Laserdioden hauptsächlich auf AlN/Saphir oder auf AlN als Volumenkristall gewachsen. Der AlN Volumenkristall weist dabei die kleinste Versetzungsdichte mit  $< 10^4 \text{ cm}^{-2}$  auf. Jedoch ist die Ausbeute der AlN Substrate zeitaufwendig und teuer. Daher wird für Forschungszwecke auf AlN/Saphir zurückgegriffen und dabei aber eine hohe Versetzungsdichte in Kauf genommen. Defekte entstehen dabei im Kristall wegen der hohen Gitterfehlanpassung an der Grenzfläche zwischen AlN und Saphir [14]. Diese Defekte ziehen sich dabei durch die darauffolgenden aufgewachsenen Schichten. Diese sog. Schraubenversetzungen (engl.: threading dislocation)

---

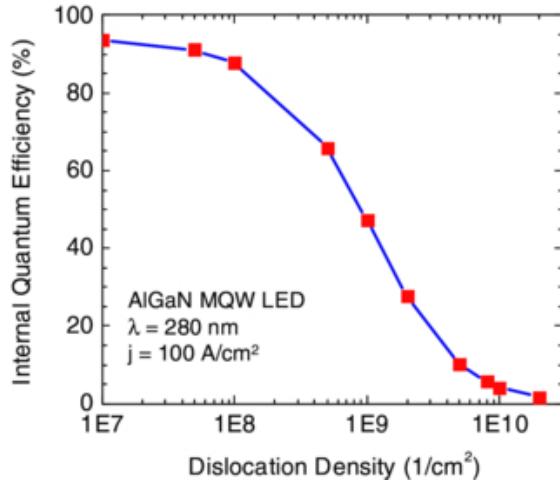
## KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

---



**Abbildung 2.5:** Verfahren zum epitaktisch lateralnen Wachstum.

haben einen wesentlichen Einfluss auf die IQE, wie in Abbildung 2.7 erkennbar. Sie



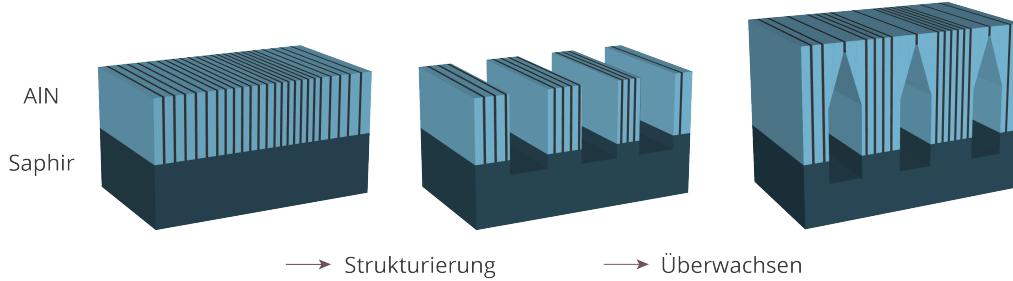
**Abbildung 2.6:** Simulation der IQE einer LED in Abhängigkeit der Versetzungsichte für einen AlGaN-MQW mit einer Wellenlänge von  $280 \text{ nm}$  [7].

agieren im Kristall als nicht-radiative Rekombinationszentren (engl.: nonradiative recombination center, kurz NRC) und bestimmen somit den Anteil nichtstrahlender Rekombinationsprozesse an der Gesamtheit aller Rekombinationsprozesse. Mit steigender Versetzungsichte sinkt die IQE der Leuchtdiode und im Bereich zwischen  $1 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$  und  $1 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-2}$  ist eine erhebliche Steigerung zu beobachten. Mittels XRD und TEM wurde gezeigt, dass die Heteroepitaxie von AlN Schichten auf Saphir zu einer Versetzungsichte von bis zu  $2 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$  führt [17].

---

## 2.6 Reduktion der Versetzungsichte durch ELO/AlN-Saphir

Um die hohe Versetzungsichte des planaren AlN/Saphir Substrates zu verringern, ist der übliche Ansatz das sog. epitaktisch laterale Überwachsen (engl.: epitaxial lateral overgrowth) oder kurz ELO. Diese Substrate wurden für alle in dieser Arbeit untersuchten Proben verwendet. Als Grundlage für ELO dient

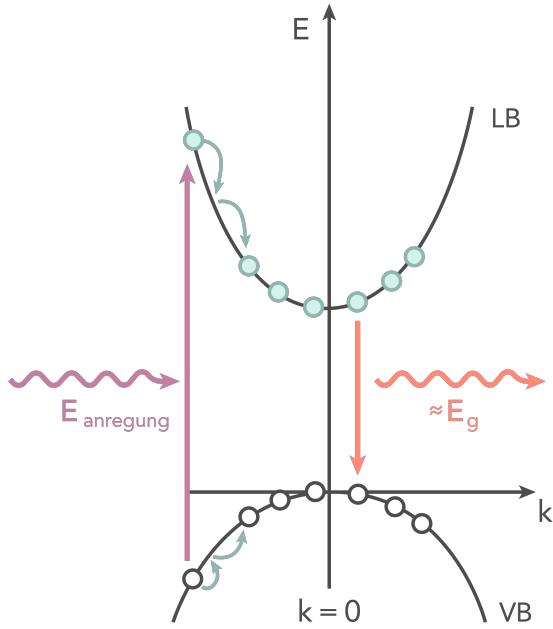


**Abbildung 2.7:** Verfahren zum epitaktisch lateralen Wachstum.

ein planares AlN/Saphir Substrat. Dieses wird strukturiert indem ein Streifenmuster mit einem periodischen Abstand von  $3.5 \mu\text{m}$  reingeätzt wird. Ein weiterer Epitaxie-Schritt mit AlN führt schließlich zum lateralen Überwachsen der Stege an den geätzten Gräben (eng.: voids). Das Material koalesziert nach einer bestimmten Dicke und bildet schließlich wieder eine bewachsbarre Oberfläche. Dabei kommt es zum Auftreten verschiedener Mechanismen wie Verspannungsabbau und gegenseitig auslöschenden Versetzungen. So ist eine Versetzungsichte ( $\leq 5 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-2}$ ) erreichbar [17] [18] [19] [20]. Für eine detaillierte Erklärung sei auf die Doktorarbeit von Viola Küller verwiesen [19].

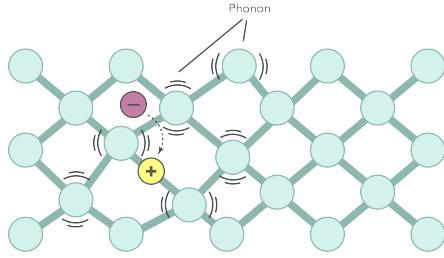
## 2.7 Rekombinationsmechanismen

In der Photolumineszenzspektroskopie wird Licht als Anregungsquelle von Halbleitermaterialien für die Erzeugung eines Elektron-Loch-Paars benutzt. Dabei wird ein Elektron aus dem Valenzband in das Leitungsband angehoben und ein Loch zurückgelassen wie in Abbildung 2.8 gezeigt wird. Die Elektronen relaxieren anschlie-

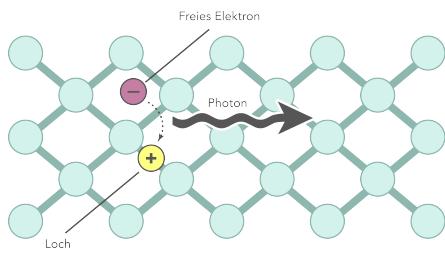


**Abbildung 2.8:** Durch Einstrahlung eines Photons mit ausreichender Energie können Elektronen vom Valenzband in das Leitungsband angeregt werden. Von dort aus re kombinieren Elektronen und Loch entweder strahlend unter Aussendung eines Photons oder nicht-strahlend.

ßend sehr schnell in das Minimum des Leitungsbandes und analog die Löcher in das Minimum des Valenzbandes. Leitungs- und Valenzband befinden sich im Fall von AlGaN am gleichen  $\vec{k}$ -Vektor im reziproken Raum, dem sog.  $\Gamma$ -Punkt. Das macht das Materialsystem AlGaN zu einem direkten Halbleiter, was von besonderem Vorteil ist. Denn ein direkter Bandübergang ist die wichtigste Grundlage für eine effiziente halbleiterbasierte Lichtquelle. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Anregung und daraufhin folgenden Rekombination unter Aussendung eines Photons ist deutlich höher, da kein Phonon am Prozess beteiligt sein muss (Abb. 2.9). Die Rekombination kann dennoch auch nicht-strahlend erfolgen, weil epitaktisch gewachsene Halbleitersstrukturen herstellungsbedingt beispielsweise nicht ohne ungewollte Dotierung durch Fremdatome, Versetzungen oder Fehlstellen an Atomgitterplätzen (Vakanzien) gewachsen werden können. Diese fungieren als sogenannte Störstellen und haben diskrete Energieniveaus, Dazu werden drei Prozesse betrachtet: Zuallererst die nichtstrahlende Rekombination, die durch die Shockley-Read-Hall- (SRH-) Rekombination an Defekten beschrieben und durch den Parameter  $A$  berücksich-

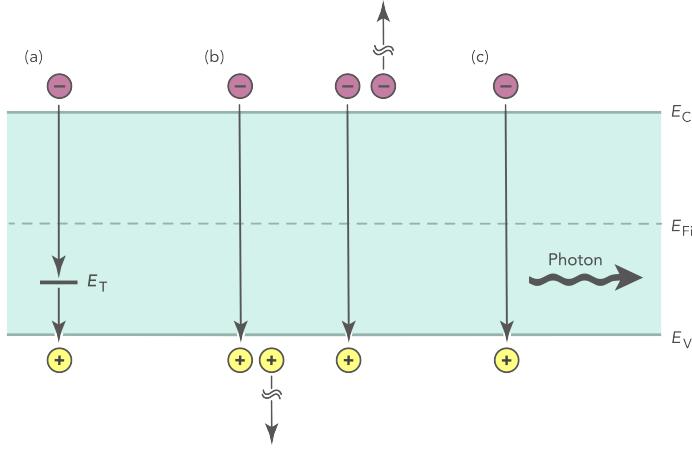


**Abbildung 2.9:** Rekombination von Elektron und Loch unter Teilnahme eines Phonons.



**Abbildung 2.10:** Strahlende Rekombination von Elektron und Loch und Austritt eines Photons

tigt wird ( $R_{nonrad} = A \cdot n$ ). Sie ist linear abhängig von der Ladungsträgerdichte  $n$ . Sie findet unter der Beteiligung eines Defektniveaus und eines Phonons statt. Der A-Koeffizient ist inverse proportional zur SRH-Rekombinations-Lebensdauer. Diese wurde bei defektreichen AlGaN-Schichten im Bereich von einigen  $ps$  gemessen. Mit AlGaN-QWs mit Bulk-AlN-Substraten wurden dagegen bereits Lebensdauern im Bereich einiger  $ns$  erreicht [21] [22]. Der strahlende Prozess der spontanen Rekombination ist für niedrige Ladungsträgerdichten quadratisch in  $n$  und tritt als Zwei-Teilchen Prozess bei dem Loch und Elektron beteiligt sind ( $R_{rad} = B \cdot n^2$ ) auf. Dieser wird beschrieben mit dem Koeffizienten B. Der B-Koeffizient ist stark abhängig vom Design des MQWs wie z.B. der QW-Dicke, QW-Barrieren-Höhe, Verzerrung des AlGaN-QWs und dem Polarisationsfeld im QW [2]. Typische Werte für den B-Koeffizienten liegen in einem Bereich um  $2 \cdot 10^{-11} cm^3 s^{-1}$  [23] [24]. Der letzte Prozess ist die Auger-Rekombination, die speziell für sehr hohe Anregungsleistungsdichten relevant ist und dann durch die kubische Abhängigkeit stark dominiert ( $R_{auger} = C \cdot n^3$ ). Dabei gibt ein bereits in das Leitungsband angeregtes Elektron seine Energie an ein weiteres Elektron im Leitungsband ab. Dieses relaxiert dann entweder wieder zum Leitungsbandminimum unter Mitwirkung von Phononen oder verlässt bei Oberflächennähe den Kristall. Der letzte Fall bildet die Grundlage für die Auger-Elektronen-Spektroskopie. Die Größenordnung des C-Koeffizienten für die Gruppe-III-Materialien ist immer noch in Diskussion [25] [26] [27] und die Werte für blau-violette LEDs liegen zwischen  $1 \cdot 10^{-31}$  und



**Abbildung 2.11:** Übersicht über die beteiligten Rekombinationsprozesse im ABC-Modell, dabei stellt (a) die SRH-Rekombination, (b) die Auger-Rekombination und (c) die strahlende Rekombination dar.

$2 \cdot 10^{-30} \text{ cm}^6 \text{ s}^{-1}$ . Die Messmethoden um den C-Koeffizienten für UV-LEDs zu bestimmen sind noch ungenauer [23]. Theoretische Modelle sagen aber voraus, dass der C-Koeffizient kleiner werden sollte mit kleiner werdender Wellenlänge [28]. Die effektive Rekombination ist somit die Summe aus der strahlenden Rekombination, der nicht-strahlenden Rekombination und der Auger-Rekombination.

$$R_{eff} = R_{rad} + R_{nonrad} + R_{auger} \quad (2.4)$$

Der allgemein verwendete Ansatz zur Beschreibung der effektiven Rekombinationsrate  $R_{eff}$  (oder auch Generationsrate  $G$ ) wird mit Hilfe der genannten Koeffizienten beschrieben. Er beruht auf der Abhängigkeit der beteiligten Prozesse von der Ladungsträgerdichte  $n$  und wird daher auch als ABC-Modell bezeichnet.

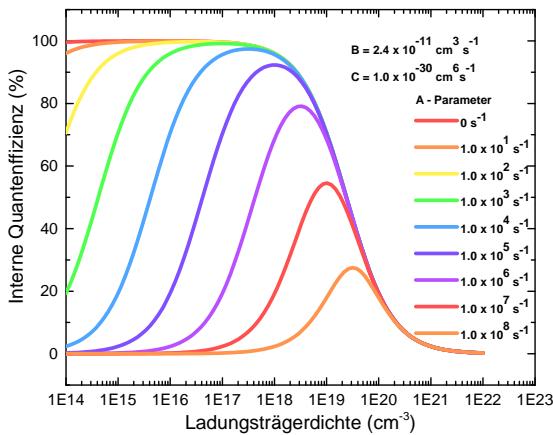
$$R_{eff}(G) = A \cdot n + B \cdot n^2 + C \cdot n^3 \quad (2.5)$$

Weiter wird angenommen, dass die Anregungsleistungsdichte des Lasers  $P$  proportional zu der Ladungsträger-Generationsrate  $G$  ist. Die strahlende Rekombination  $R_{rad}$  wird hauptsächlich durch den Überlapp der Wellenfunktionen von Elektronen

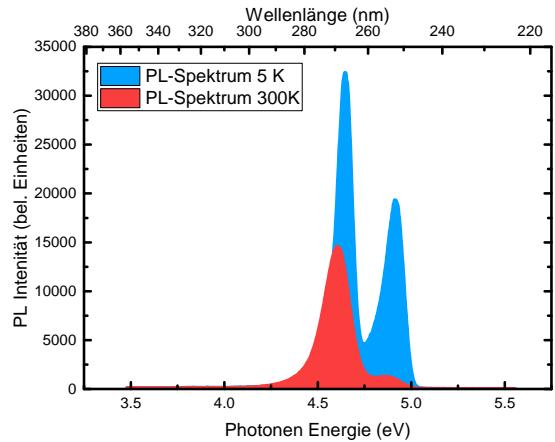
---

und Loch im Leitungsband und Valenzband des QW beeinflusst. Dieser wiederum ist stark abhangig vom QCSE (Abb. 2.4) und besonders bedeutend bei heteroepitaktisch gewachsenen Halbleiterstrukturen.

## 2.8 Bestimmung der internen Quanteneffizienz



**Abbildung 2.12:** Abhängigkeit der internen Quanteneffizienz von der Ladungsträgerdichte für feste Parameter B und C. Der Parameter A wird mit 9 verschiedenen Werten von  $0\text{s}^{-1}$  bis  $10^9\text{s}^{-1}$  variiert [9].



**Abbildung 2.13:** Photolumineszenzspektrum bei  $5\text{K}$  und  $300\text{K}$ . Die integrierte Intensität ist die Fläche des jeweiligen Spektrums.

Die aktive Region einer idealen LED würde für jedes injizierte Elektron jeweils ein Photon aussenden. Das bedeutet, dass die IQE, die nach [29] wie folgt definiert ist,

$$IQE = \frac{\text{Anzahl der Photonen die von der aktiven Zone emittiert werden pro Sekunde}}{\text{Anzahl der Elektronen die in die LED injiziert werden pro Sekunde}} \quad (2.6)$$

den Wert 1 annehmen müsste. Die IQE kann somit analog als Verhältnis von strahlender Rekombination und der effektiven Rekombination beschrieben werden. Ausgedrückt durch Ratengleichungen und mit 2.4 ist die IQE in ihrer einfachsten Form somit

$$IQE = \frac{B \cdot n^2}{A \cdot n + B \cdot n^2 + C \cdot n^3} = \frac{R_{rad}}{R_{eff}} \quad (2.7)$$

Die IQE kann experimentell mit Hilfe der Photolumineszenzspektroskopie bestimmt werden, indem angenommen wird, dass keine thermisch aktivierten Defekte bei Tieftemperatur vorhanden sind

$$A \propto e^{\frac{-E_{activation}}{kT}} \quad (2.8)$$

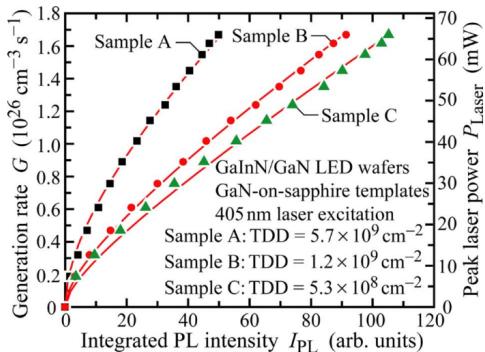

---

Mit dieser und der Annahme, dass keine Auger Rekombination ( $C \cdot n^3$ ) auftritt, ist die IQE bei Tieftemperatur ( $\propto 5K$ ) gleich 1. Somit kann die IQE als Quotient der integrierten PL Intensität bei Temperatur T und integrierter PL Intensität bei Tieftemperatur ( $5K$ ) beschrieben werden.

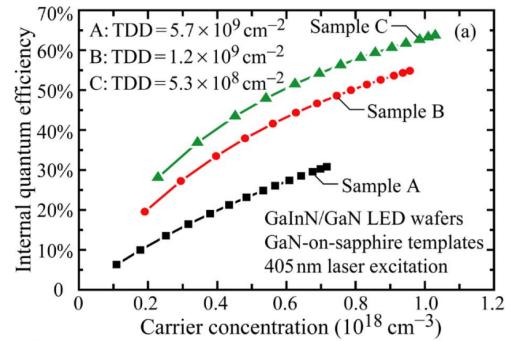
$$IQE(T) = \frac{\text{Integrierte PL Intensität (T)}}{\text{Integrierte PL Intensität (}T \rightarrow 0K\text{)}} \quad (2.9)$$

Die IQE ist folglich abhängig von der Temperatur, da der Parameter A für die SRH-Rekombination temperaturabhängig ist (Abb. 2.12). Um also die IQE bei Raumtemperatur zu bestimmen, wird das Spektrum einer Probe bei 5K und 300K bei ansonsten möglichst gleichen Bedingungen aufgenommen, wie in Abbildung 2.13 exemplarisch dargestellt ist. Die Intensität in Abhängigkeit der Wellenlänge wird interpoliert, dann integriert und dann das Verhältnis berechnet.

## 2.9 Bestimmung der IQE bei Raumtemperatur durch Fitting



**Abbildung 2.14:** Fit für die Generationsrate in Abhängigkeit der integrierten PL-Intensität für drei InGaN/GaN MQW Proben mit unterschiedlichen Versetzungsichten [30].



**Abbildung 2.15:** Ergebnisse für die IQE in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte aus den durch die Fits extrahierten Werte [30].

In diesem Kapitel soll nun eine in [30] und [31] gezeigte Methode zur Bestimmung der IQE durch ein Fitting-Modell für die integrierte Intensität in Abhängigkeit der

## KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

---

Ladungsträgerdichte vorgestellt werden. Das ist insbesondere von Vorteil, da so ein aufwendiges Runterkühlen nicht mehr notwendig wäre, da die Spektren allein bei Raumtemperatur durch leistungsdichteabhängige Messungen aufgenommen werden könnten.

Anfangen mit der Rekombinationsrate geht das Modell davon aus, dass bei Raumtemperatur die Auger-Rekombination nur bei sehr hohen Anregungsleistungsdichten wegen der kubischen Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte  $n$  relevant ist. Die Generationsrate  $G$  und die IQE bei Gleichgewichtsbedingungen sind somit

$$G = R_{eff} = A \cdot n + B \cdot n^2 \quad (2.10)$$

$$IQE = \frac{B \cdot n^2}{A \cdot n + B \cdot n^2} = \frac{B \cdot n^2}{G}. \quad (2.11)$$

$G$  beschreibt namentlich die Rate der Ladungsträger, die durch Bestrahlung mit dem Laser erzeugt werden und entspricht hierbei der effektiven Rekombinationsrate  $R_{eff}$ . Die integrierte PL-Intensität lässt sich als

$$I_{PL} = \eta \cdot B \cdot n^2 \quad (2.12)$$

darstellen.  $\eta$  ist eine Konstante, die durch das Volumen der angeregten aktiven Region und der Kollektionseffizienz bestimmt wird. Durch Eliminierung von  $n$  in den Gleichungen 2.10 und 2.12 kann die Generationsrate durch die integrierte PL-Intensität als

$$G = \frac{A}{\sqrt{B \cdot n}} \sqrt{I_{PL}} + \frac{1}{\eta} I_{PL} \quad (2.13)$$

beschrieben werden. Um dies in Zusammenhang mit dem Experiment zu bringen, kann die Generationsrate mit Nutzung experimenteller Werte getrennt als

$$G = \frac{P_{laser}(1 - R)\alpha l}{A_{spot}lhv} = \frac{P_{laser}(1 - R)\alpha}{(A_{spot}hv)} \quad (2.14)$$

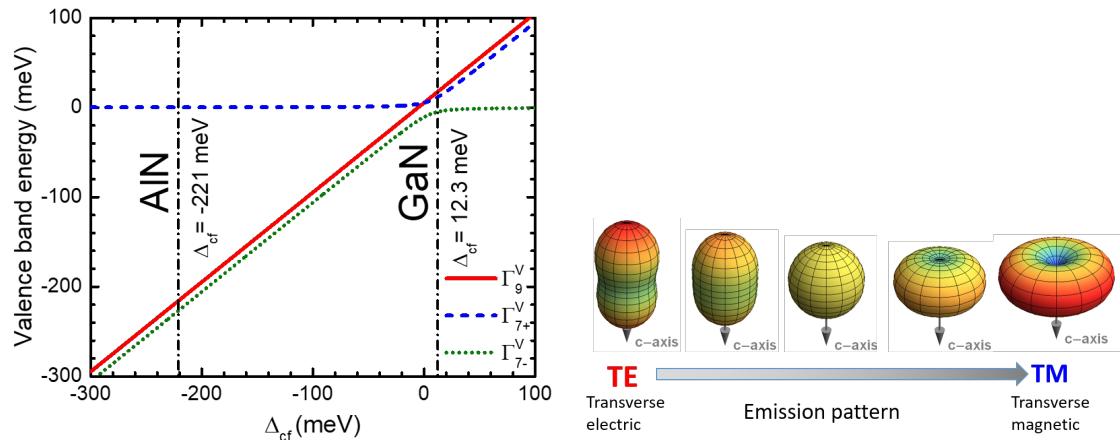
berechnet werden. Dabei ist  $P_{laser}$  die optische Leistung, die auf der Probe landet,  $R$  ist die Fresnel Reflexion auf der Probenoberfläche,  $A_{spot}$  ist die Fläche des Laserspots auf der Probe,  $hv$  ist die Energie eines Photons mit 193nm und  $\alpha$  ist der Absorptionskoeffizient. Damit ist es möglich die Generationsrate zu bestimmen

und in Abhängigkeit der integrierten PL-Intensität darzustellen. Dadurch, dass die Koeffizienten  $c_1 = A\sqrt{B\eta}$  und  $c_2 = 1/\eta$  durch einen Fit der Generationsrate in Abhängigkeit der integrierten Intensität extrahiert werden können, ist es möglich die IQE zu bestimmen. Dazu wird  $c_1$  nach A umgestellt ( $A = \sqrt{B\eta} \cdot c_1$ ) und in 2.10 eingesetzt, woraus sich

$$G = \sqrt{B\eta} \cdot c_1 \cdot n + (\sqrt{B} \cdot n)^2 \quad (2.15)$$

ergibt. Durch Lösen von Gleichung 2.15, für  $(\sqrt{B} \cdot n)$  und Einsetzen in Gleichung 2.11 ist es so möglich die IQE basierend auf anregungsleistungsdichteabhängigen PL-Messungen bei Raumtemperatur zu bestimmen (Abb. 2.15).

## 2.10 Optische Polarisation und Valenzbandstruktur

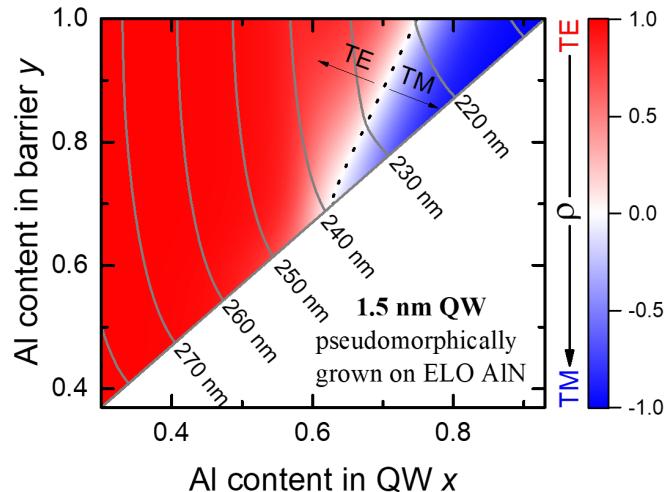


**Abbildung 2.16:** Energetische Reihenfolge der Valenzbänder in Abhängigkeit der Kristallfeldaufspaltung. Sichtbar ist der Wechsel der Bandanordnung mit sinkender Kristallfeldaufspaltung und der Effekt des „anti-crossing“ bei den Bändern gleicher Symmetrie. [32]

**Abbildung 2.17:** Kontinuierlich ändernde Abstrahlcharakteristik in Abhängigkeit der Polarisation von TE- zu TM [33].

Durch die Prozessierung und die Flip-Chip-Montage kann Licht nur durch die untere, unbewachsene Seite des Saphir-Substrates ausgekoppelt werden. Die Art

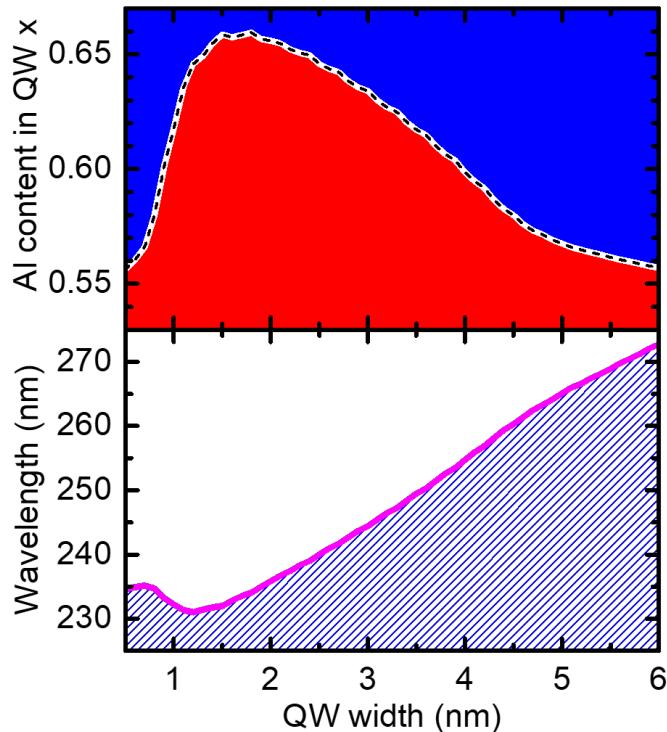
und Weise der Lichtauskopplung hat einen bedeutenden Einfluss auf die EE und damit auf die EQE. Durch die Geometrie bestimmt, hängt die EE maßgeblich vom Emissionsprofil ab, sodass Licht, welches senkrecht zur Quantenfilmebene abgestrahlt wird, die höchste EE aufweist. Um diese zu optimieren, ist es wichtig, die Bandstrukturen zu betrachten. Die Valenzbandstrukturen von AlN und GaN



**Abbildung 2.18:** Simulationsergebnisse des Polarisationsgrades in Abhängigkeit der Aluminiumkonzentration der Barrieren und QWs, basierend auf dem k-p-Modell, für AlGaN-QW mit  $1.5\text{nm}$ -Dicke, die pseudomorph auf ELO-AlN gewachsen wurden. Die gestrichelte Linie zeigt, dass der Wechsel der Polarisierung vom Aluminiumanteil in den Barrieren und QWs abhängig ist [32].

unterscheiden sich durch die unterschiedliche Anordnung der Bänder. Neben dem Leitungsband gibt es ein durch Spin-Bahn-Wechselwirkung und Kristallfeldenergie dreifach aufgespaltenes Valenzband [34]. Sie werden nach ihrer energetischen Lage als A-, B- und C-Band bezeichnet. In AlN hat das A-Band eine  $\Gamma_{7+}^L$ , das B-Band eine  $\Gamma_9^L$  und das C-Band eine  $\Gamma_7^L$  Symmetrie. Bei GaN hingegen gilt folgende Reihenfolge:  $\Gamma_9^L$ ,  $\Gamma_{7+}^L$ ,  $\Gamma_7^L$ . Die Ursache für den Symmetriewechsel liegt in der großen negativen Kristallfeldenergie von AlN mit einem Wert von  $-221\text{meV}$  [35] im Vergleich zur positiven von GaN mit  $12,3\text{meV}$  [36]. Bei Raumtemperatur wird, nach der Fermi-Dirac-Verteilung, das oberste Band mit der  $\Gamma_{7+}^L$ -Symmetrie besetzt. Aus Zuständen des  $p_z$  bestehend wird transversal magnetisch (TM) polarisiertes Licht emittiert. Die strahlende Rekombination findet demnach überwiegend mit Elektronen und Löchern aus dem A-Band mit  $\Gamma_{7+}^L$ -Symmetrie statt. In GaN ist das

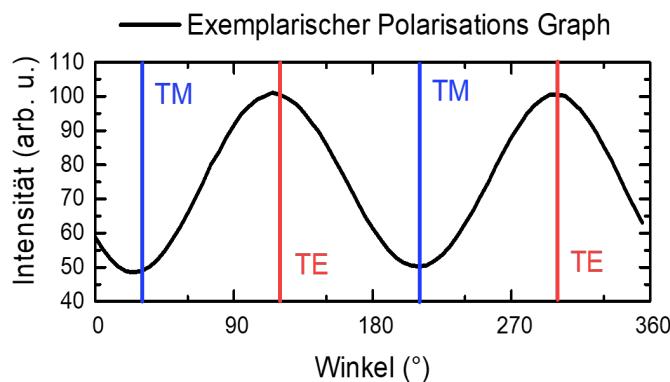
oberste Valenzband am  $\gamma$ -Punkt mit  $\Gamma_9^L$ -Symmetrie. Das elektrische Feld des Lichtes ist senkrecht zur c-Kristallachse und wird durch Übergänge ins A- und B- Band erzeugt [37], die aus Zuständen des  $p_x$ -und  $p_y$ -Orbitals bestehen. Bei strahlender Rekombination von Elektronen mit den Löchern im A- und B-Band entsteht also überwiegend TE-polarisiertes Licht [37]. Licht kann nicht ausgekoppelt werden,



**Abbildung 2.19:** Ergebnisse der Simulation für die Polarisation in Abhängigkeit von der QW-Dicke(Wellenlänge) und dem Al-Gehalt in den QWs [32].

da es nur in der x-y- Ebene (parallel zur Quantenfilmebene) emittiert. Daraus resultierend sinkt die EE und damit die EQE. Bei  $Al_xGa_{1-x}N$  kommt es mit steigendem Aluminiumgehalt zu einer kontinuierlichen Verschiebung der Valenzbänder. Folgend tritt das sog. „anti-crossing“ des  $\Gamma_{7+}^L$  und  $\Gamma_{7-}^L$  auf und resultiert in einer Änderung der Oszillatorstärke und folglich der Polarisationseigenschaften [32]. Das bedeutet, dass die Lichtemission sich hauptsächlich von TE-polarisiertem Licht zu TM-polarisiertem Licht ändert. Der genaue Aluminiumgehalt an dem die Valenzbandkreuzung auftritt, ist noch nicht hinreichend bekannt. Theoretische Betrachtungen sagen für unverzerrtes  $Al_xGa_{1-x}N$  einen Kreuzungspunkt bei ca. 7%

vorher [38]. Durch den starken Einfluss von Verzerrungen auf die Energie der Valenzbandkante, ist die Polarisation von der wachsenden biaxialen Verzerrung bei steigendem Aluminiumgehalt abhängig. So wurde von Kawanishi et al. experimentell der Wechsel bei einem Aluminiumgehalt von „75%“ festgestellt [39]. Noch dazu ist die Polarisation bei MQWs vom Ladungsträgereinschluss abhängig. Dieser ist hauptsächlich durch die Barrierenhöhe und Barrierendicke bestimmt. Mit kleiner werdender Barrierendicke steigt der Grad der Polarisation durch den gesteigerten Einfluss des QCSE [40]. Reich et al. untersuchte unter diesem Zusammenhang die optische Polarisation der Emission von UVC-Leuchtdioden(LEDs) auf Basis von (0001) orientierten  $Al_xGa_{1-x}N$ -MQWs mit Simulationen und Elektrolumineszenzmessungen [32]. Dabei stellte er fest, dass mit zunehmendem Aluminium-Gehalt in den QWs die inplanare-Intensität des TE polarisierten Lichtes gegenüber dem des TM polarisierten Lichts abnimmt, was auf die Neuordnung der Valenzbänder in  $Al_xGa_{1-x}N$  zurückzuführen ist. Durch Modellrechnungen, basierend auf dem  $k \cdot p$ -Modell, wurde die Abhängigkeit der Polarisation von der Aluminiumkonzentration in den Barrieren und QWs für pseudomorph aufgewachsene ELO-AlN, wie Abbildung 2.18) zeigt, berechnet. Zusätzlich wurde die Polarisation in Abhängigkeit einer Variation der QW-Dicke und dem Al-Gehalt in den QWs, wie in Abbildung 2.19) sichtbar, betrachtet. Diese Erkenntnisse lassen sich zusätzlich mit



**Abbildung 2.20:** Exemplarischer Graph einer Polarisationsmessung mit Hilfe von Photolumineszenzspektroskopie. Zu sehen ist die integrierte Intensität in Abhängigkeit des Winkels eines Polarisators. Zur Bestimmung des Polarisationsgrades wird die integrierte Intensität der TM-Emission(Blau)  $I_T$ ; und der TE-Emission(Rot)  $I_{TE}$  in Gleichung 2.16 eingesetzt.

---

Hilfe von Photolumineszenz prüfen. So lässt sich die Polarisation ermitteln, indem die Polarisation  $\rho$  der Photolumineszenzemission aus der Kante einer Probe mit Hilfe der Gleichung

$$\rho = \frac{I_{TE} - I_{TM}}{I_{TE} + I_{TM}} \quad (2.16)$$

bestimmt wird. Dabei ist  $I_{TE}$  die integrierte Intensität der TE-polarisierten und  $I_{TM}$  die Intensität der TM-polarisierten Emission.

## KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

---

# Kapitel 3

## Aufbau

### 3.1 Photolumineszenzaufbau

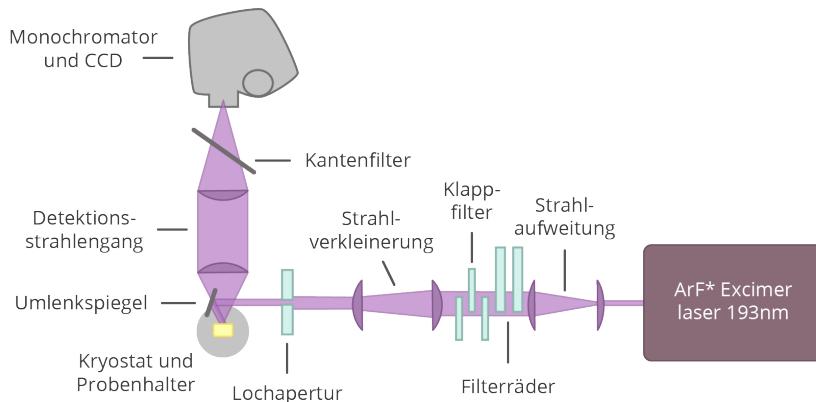


Abbildung 3.1: Aufbau des Photolumineszenzmessplatzes der AG Kneissl.

Für die experimentelle Untersuchung der UV-Photolumineszenz wurde der PL-Aufbau der AG-Kneissl, den Christoph Reich in der Zeit seiner Diplomarbeit aufgebaut und während seiner Promotion erweitert hat, verwendet [41]. Als Anregungsquelle für die Photolumineszenz dient ein ArF-Excimerlaser mit einer Wellenlänge von  $193\text{ nm}$  ( $6,4\text{ eV}$ ). Mit dieser Wellenlänge ist er bestens geeignet für die Überbandanregung von Nitridhalbleitern. Des Weiteren bietet der Aufbau die

## KAPITEL 3. AUFBAU

---

Möglichkeit von temperaturabhängigen Untersuchungen von  $5\text{ K}$  bis  $300\text{K}$ . Dies ist auch die Grundlage für die Bestimmung der IQE.

Der Laser mit dem Modellnamen "Xantos" von der Firma Coherent bietet eine maximale Emissionsenergie von  $5\text{ mJ}$  und eine einstellbare Frequenz bis zu  $500\text{ Hz}$  bei einer Pulsdauer von  $5\text{ ns}$ . Durch interne Rückkopplung ist eine Energiestabilisierung möglich, die die Schwankung der Anregungsleistung auf 3 Prozent minimiert.

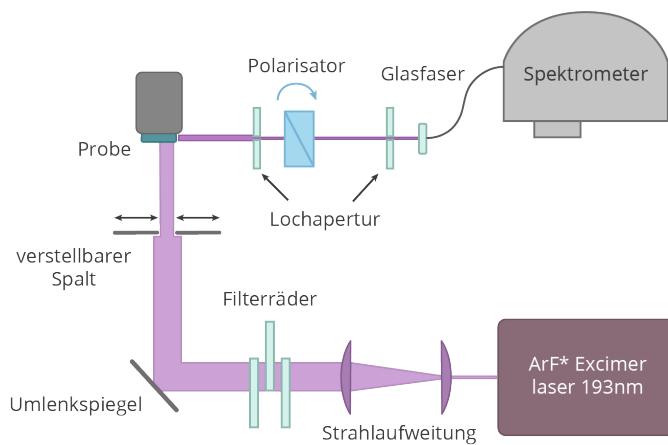
Die Ansteuerung des kompletten Messvorgangs erfolgt durch die Messsoftware von Christoph Reich, entwickelt in der grafischen Programmiersprache "LabView" von Texas Instruments. Diese ermöglicht alle nötigen Einstellungen an Pumpen, Heizern, Laser, Filtern und Spektrometer, um einen nahezu komplett automatisierten Messvorgang zu starten. Spektren können so mit verschiedenen Parametern wie Position, Anregungsleistungsdichte, Temperatur, Energiebereich und Integrationszeit aufgenommen werden und auch ein Gaswechsel ist möglich.

Beginnend vom Laser wird im ersten Schritt der Laserstrahl durch ein Linsensystem, bestehend aus einer Zerstreuungs- und Sammellinse, aufgeweitet. Dieser Schritt ermöglicht es, die Anregungsleistungsdichte zu verringern, um die am Aufbau beteiligten Geräten, insbesondere die Filterräder, nicht mit zu hohen Leistungen zu beschädigen. Mit Hilfe der Filterräder ist es möglich, die Anregungsleistungsdichte 61 stufig zu variieren und somit leistungsdichteabhängige IQE Messungen zu machen. Als nächstes passiert der Strahl ein Linsensystem aus zwei Sammellinsen für eine Strahlverkleinerung. Vor dem Auftreffen des Strahles am Probenhalter im Kryostaten passiert der Strahl noch eine Lochblende. Sie dient der Entfernung achsennaher Strahlen und um bei Bedarf den Strahldurchmesser noch weiter zu verringern. Um den Strahl in Richtung des Probenhalters durch das Fenster im Kryostaten zu lenken, wird ein Spiegel mit einer dielektrischen Beschichtung benutzt. Der Laserstrahl durchdringt die Fenster des Kryostaten, welche speziell für eine hohe Transmission in diesem Wellenlängenbereich ausgelegt sind. Der Kryostat selbst ist horizontal und vertikal verschiebbar, um die Messung mehrerer Proben im Probenhalter in einem Messvorgang bei gleichen Bedingungen zu ermöglichen. Die Proben werden mit einem Kleber auf dem Probenhalter selbst befestigt, bevor dieser in den Kryostaten geschoben wird. Die Anregung der Proben mit dem Laserstrahl führt zur Proben spezifischen Emission

---

von Licht. Diese wird von einer Linse im Strahlengang vor dem Detektor eingefangen und von einer zweiten Linse auf den Monochromatorspalt fokussiert. Bei dem Monochromator handelt es sich um einen „iHR 320“ des Herstellers „Horiba“. Zur Verfügung stehen drei Blazegitter mit  $300 \frac{\text{Linien}}{\text{mm}}$ ,  $600 \frac{\text{Linien}}{\text{mm}}$  und  $1800 \frac{\text{Linien}}{\text{mm}}$ . Bei der verwendeten Spaltbreite von  $100 \mu\text{m}$ , entspricht die maximale Auflösung in etwa  $5 \text{ meV}$  ( $0,17 \text{ nm}$ ). Für Messungen oberhalb von  $225 \text{ nm}$  besteht die Möglichkeit einen Kantenfilter in den Strahlengang zu stellen, mit dem das Laserstreulicht und dessen höhere Ordnungen aus dem Spektrum entfernt werden kann. Bei dem CCD Chip handelt es sich um das Modell „Syncerity“ von „Horiba“ der „open electrode“ Bauart mit  $1024 \times 256$  einzelnen Pixeln.

## 3.2 Messaufbau Lichtpolarisation

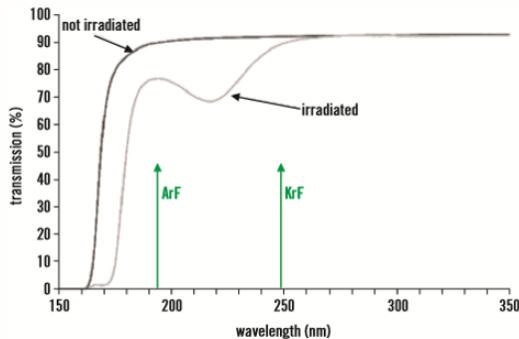


**Abbildung 3.2:** Aufbau des Photolumineszenzmessplatzes der AG Kneissl zur Bestimmung der Polarisation.

Für die Messung der Lichtpolarisation erfolgt die Anregung der untersuchten Proben senkrecht zur Oberfläche. Die Lumineszenz der Probe wird aus der Kante gemessen, weil TM-polarisiertes Licht nur vertikal zur c-Achse, wie in Abbildung 2.17 sichtbar, emittiert wird. Die Lumineszenz wird dann unter kleinem Öffnungs-

winkel über eine Linse mit sich dahinter befindender Blende eingesammelt und parallelisiert. Das parallelisierte Licht wird dann durch einen Glan-Taylor-Polarisator geleitet. Dass das Licht parallelisiert ist, ist wegen der anisotropen Brechzahl des Polarisators wichtig. Diese ist neben der Polarisationsrichtung auch von dem Eintrittswinkel abhängig ist und entscheidet ob der Strahl transmittiert oder reflektiert wird [42]. In Abhängigkeit der Orientierung des Polarisators wird TE- oder TM-polarisiertes Licht transmittiert und der eingestellte Winkel lässt sich 1 deg granular einstellen.

### 3.3 Bestimmung der Degradation des UV Quarzglases



**Abbildung 3.3:** Vom Hersteller angegebene wellenlängenabhängige Transmission vor und nach Degradation durch Bestrahlung.

Da die Messung der Anregungsleistungsdichte erfolgt, bevor das Laserlicht die Probe durch das UV-Quarzglas im Kryostaten trifft, ist es wichtig den Transmissionsverlust zu bestimmen, um die realen Werte für die Anregungsleistungsdichte zu kennen (Die Anregungsleistungsdichte die bei der Probe ankommt). Der Kryostat besitzt vier Fenster, bestehend aus UV-Quarzglas, das besonders transparent im UV-Wellenlängen bereich ist. Durch diese Fenster dringt das Laserlicht in den Probenhalter ein. Von diesen Fenstern war und ist eines in dauerhaftem Gebrauch. Wie in Abb. 3.3 zu sehen ist, weisen die Fenster aber mit der fortlaufender Bestrahlung Degradation auf, so nimmt laut Hersteller durch Degradation die Trans-

mission von 90 Prozent bis auf ca. 75 Prozent ab für eine Wellenlänge von 193 nm. Um nun den Transmissionsgrad zu bestimmen, wurde der Probenhalter aus dem Kryostat entfernt, damit das Laserlicht ungehindert durch zwei parallel liegende Fenster durchdringen kann, um so auch die Anregungsleistungsdichte des Laserlichtes nach durchdringen des letzten Fenster messen zu können. So konnte die Anregungsleistungsdichte vor dem Eintreten und nach dem Austreten in den Kryostaten bestimmt werden. Dies wurde einmal bei den parallel liegenden unbenutzten Fenstern gemacht. Davon ausgehend, dass beide Fenster, da unbenutzt, den gleichen Transmissionsgrad haben, kann darauf zurückgeschlossen werden, dass ein unbenutztes Fenster einen Transmissionsgrad von 59 Prozent aufweist, was um ca. 10 Prozent von der Herstellerangabe abweicht, die aber nicht die Reflektion im Kryostaten mitberechnet. Um den Transmissionsgrad des benutzten Fensters zu

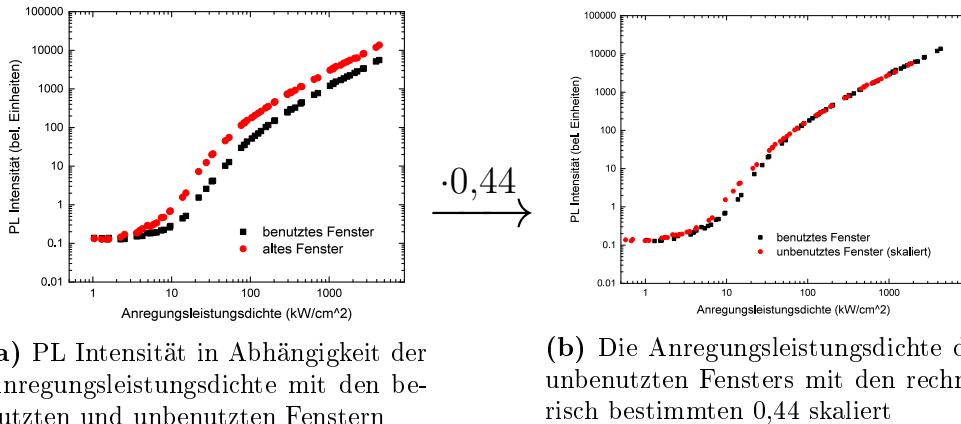


Abbildung 3.4

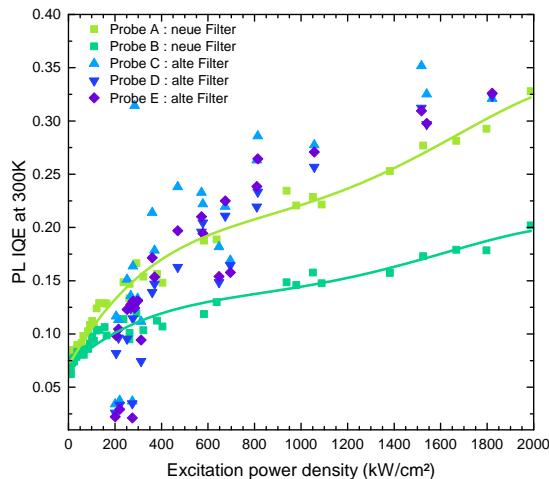
bestimmen, wurde die Transmission durch das benutzte Fenster und dem parallel liegenden unbenutzten Fenster gemessen. Mit dem Wissen, dass der Transmissionsgrad durch das unbenutzte Fenster bei 59 Prozent ( $T_{unb} = 0,59$ ), kann die Transmission durch das benutzte Fenster auf 26 Prozent ( $T_{ben} = 0,26$ ) runtergerechnet werden. Davon ausgehend, dass die Transmission bei höheren Wellenlängen (Emission) gleich und bei beiden Fenstern ähnlich ist,

$$F_{skal} = \frac{T_{ben}}{T_{unb}} = 0,44 \quad (3.1)$$

kann der Skalierungsfaktor mit für die Anregungsleistungsdichte auf 0,44 bestimmt werden. Was bedeutet, dass durch Degradation die Transmission auf 44 Prozent der ursprünglichen Transmission gesunken ist. Dies bestätigt sich auch durch die Gegenüberstellung in Abb. 3.4. Dies bedeutet, dass durch die zeitliche Degradation die Transmission auf 44 Prozent der ursprünglichen gesunken ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass von der Anregungsleistungsdichte durch die geringe Transmission der Fenster und Reflektion im und außerhalb des Kryostaten nur ca. 26 Prozent bei der Probe ankommen.

### 3.4 Erweiterung der Filterkombinationen

Im Zuge dieser Arbeit wurden für eine Erhöhung der Messpunkte und Verringerung von Rauschen bei der leistungsdichteabhängigen Messung der IQE die Anzahl der Filterkombination erhöht. Dafür wurden die alten zwei Filterräder durch drei neue ersetzt.



**Abbildung 3.5:** Vergleich der Messung von insgesamt 5 ähnlichen Proben. 3 Proben (blau) wurden mit dem alten Setup gemessen. 2 Proben (grün, durchgezogene Linie) wurden mit dem neuen Setup gemessen.

Durch die erhöhte Anzahl möglicher Filterkombinationen ist es möglich, statt nur 27 verschiedene Messpunkte 61 zu messen. Es ist deutlich sichtbar, dass speziell der Bereich der geringen Anregungsleistungsdichten viel besser aufgelöst werden

---

kann (Abb: [3.5]). Und wie zu erwarten, sinkt die Intensität nicht mehr plötzlich ab einer Anregungsleistungsdichte von  $200 \frac{kW}{cm^2}$  auf 0, sondern weist stattdessen eine Ordinate größer Null auf. Wie laut Gleichung 5.6 zu erwarten wäre. Somit hat die Erweiterung und Verbesserung der Filterräder, nicht nur mehr Präzision und weniger Rauschen als Ergebnis, sondern liefert nun auch physikalisch verwertbarere Werte.

## KAPITEL 3. AUFBAU

---

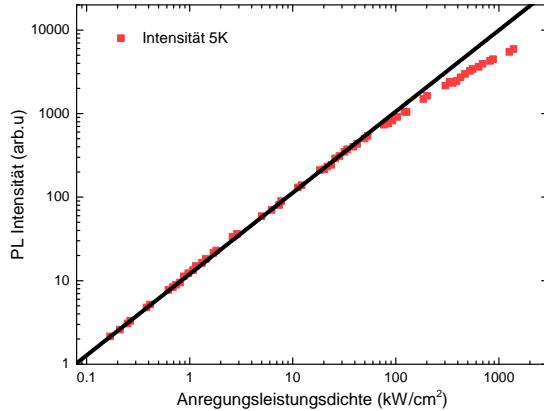
## Kapitel 4

# Einfluss der Auger-Rekombination auf die IQE

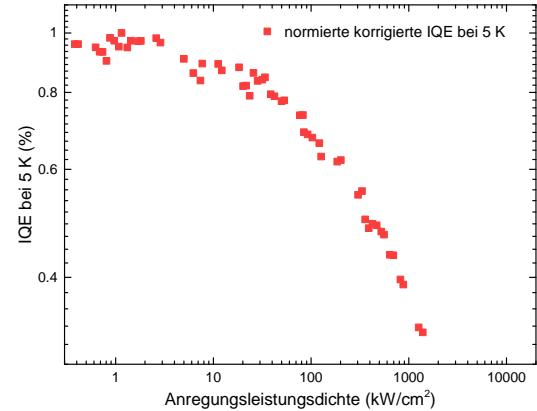
Das bisher benutzte Modell zur Bestimmung der PL-IQE ging davon aus, dass bei Tieftemperatur keine Auger-Rekombination (Gleichung) vorkommt, aber wie in Abb. 4.1 deutlich zu erkennen, nimmt der Verlauf der PL-Intensität in doppeltlogarithmischer Darstellung gegenüber der Anregungsleistungsdichte (die direkt proportional zur Ladungsträgerdichte ist), im Bereich höherer Anregungsleistungen (entsprechend höheren Ladungsträgerdichten) deutlich ab und weist keinen linearen Verlauf mehr auf, den er aber durch eine allein quadratische Abhängigkeit (in doppeltlogarithmischer Darstellung linear) haben sollte. Dies zeigt, dass die IQE nicht, wie bisher angenommen, immer bei 100 Prozent liegt, sondern auch bei Tieftemperatur Anregungsleistungsdichte abhängig ist. Das dieser Verlustmechanismus ähnlich wie bei InGaN/GaN auf Auger-Rekombination basiert wurde von Nippert et al. bestätigt [43]. Um dies zu berücksichtigen, wird nun die IQE bei 5K definiert als:

$$IQE_{corr}(T = 5K, P_{exc}) = \frac{\frac{I_{pl}(T, P_{exc})}{P_{exc}}}{I_{norm}} \quad (4.1)$$


---



**Abbildung 4.1:** Die Grafik zeigt die integrierte Intensität bei Tieftemperatur ( $5K$ ) in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte. In doppeltlogarithmischer Darstellung müsste die integrierte Intensität wegen  $R = B \cdot n^2$  linear steigen (schwarze Linie).



**Abbildung 4.2:** Die Grafik zeigt die normierte korrigierte IQE bei  $5K$  nach Gleichung 4.1

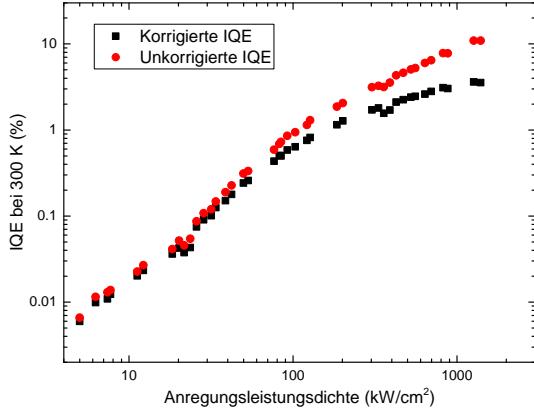
mit dem Maximum der Verhältnisse von integrierter PL-Intensität zu Anregungsleistungsdichte als Normierungsfaktor über alle  $n$  Anregungsleistungsdichten

$$I_{norm} = \left\| \sum_{i=1}^n \frac{I_{pl}(T, P_{exc,i})}{P_{exc,i}} \right\|_{max} \quad (4.2)$$

Wobei  $I_{pl}(P_{exc})$  die von der Anregungsleistungsdichte  $P_{exc}$  und Temperatur  $T = 5K$  abhängige integrierte PL-Intensität ist. Die integrierte PL-Intensität wird durch die Anregungsleistungsdichte dividiert und auf das Maximum normiert, so dass das Maximum der IQE bei  $5K$  bei der geringsten Anregungsleistungsdichte mit der geringsten Auger-Rekombination liegen sollte. Um nun die IQE bei Raumtemperatur zu bestimmen, wird die nach dem alten Verfahren ermittelte IQE multipliziert mit den neu ermittelten Werten passend zur Anregungsleistungsdichte.

$$IQE_{corr}(T, A_{exc}) = \frac{IQE(T, A_{exc})}{IQE(5K, A_{exc})} \cdot IQE_{corr}(5K, A_{exc}) \quad (4.3)$$

Die IQE bei  $5K$  dient hierbei also als Skalierungsfaktor, der den Einfluss der Auger-Rekombination bei Raumtemperatur korrigiert. Somit fällt im Vergleich insbesondere auf, dass die Skalierung bei den kleinsten Anregungsleistungsdichten am ge-



**Abbildung 4.3:** Die Grafik zeigt den Vergleich von korrigierter und unkorrigierter IQE bei 300K nach Gleichung 4.3

ringsten Einfluss hat und mit steigender Anregungsleistungsdichte kubisch steigt, so dass die nach dem alten Verfahren ermittelten IQE-Werte bei höheren Anregungsleistungsdichten deutlich nach unten korrigiert werden müssen. Auch wenn mit diesem Verfahren dem Einfluss der Auger-Rekombination entgegengekommen wird, so gibt es noch weitere Fallstricke bei der IQE-Bestimmung. Ein erhebliches Problem steckt in der nicht-resonanten Anregung mit dem ArF-Excimer Laser, denn das Laserlicht wird wegen der hohen Energie auch von allen Schichten und damit insbesondere von den Barrieren absorbiert. Die angeregten Ladungsträger müssen in den QW diffundieren und dort relaxieren, rekombinieren aber potentiell in den Barrieren, was im Spektrum als Barrieren Peak speziell bei Tieftemperatur zu sehen ist. Daraus und aus Absorption resultierend scheitern AlGaN-Heterostrukturen die mit einem ArF Laser angeregt werden, eine Sättigung in der IQE zu erreichen [43]. Ohne diese ist es schwer eine echte IQE anzugeben, da die in QWs gelangende Laserstrahlung, von nicht-resonanter Anregung ausgehend, von Materialparametern wie der Absorption und thermischen Diffusion abhängen und somit nicht klar ist, welche Anregungsleistungsdichte tatsächlich in die QWs gelangt. Weswegen ein Vergleich von Proben die sich in ihren Absorptionseigenschaften stark unterscheiden, schwer zu vergleichen sind, wenn die maximale IQE nicht bestimmt werden kann [44].

## KAPITEL 4. EINFLUSS DER AUGER-REKOMBINATION AUF DIE IQE

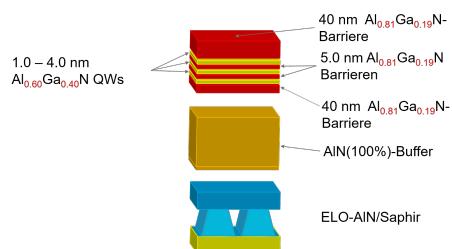
---

# Kapitel 5

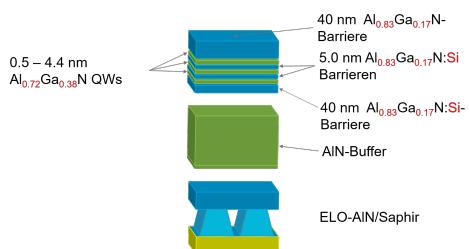
## Untersuchung des MQW-Designs von AlGaN-UVC-Heterostrukturen

### 5.1 Einleitung

Dieses Kapitel widmet sich der Untersuchung von AlGaN-MQWs von UVC-LED-Heterostrukturen verschiedener Dicken mit dotierten und undotierten Barrieren. Mit Hilfe der UV-Photolumineszenz sollen der Einfluss der variierenden QW-Dicke und Dotierung auf die interne Quanteneffizienz und die Emissionsenergien untersucht werden.



**Abbildung 5.1:** Aufbau der untersuchten MQW-Proben ohne dotierte Barrieren.



**Abbildung 5.2:** Aufbau der untersuchten MQW-Proben mit dotierten Barrieren.

Der Aufbau der Proben ohne dotierte Barrieren ist in Abbildung 5.1 zu sehen. Die aktive Zone setzt sich aus zwei  $5\text{ nm}$  dicken  $Al_{0.81}Ga_{0.19}N$ -Barrieren zwischen den drei  $Al_{0.60}Ga_{0.40}N$  QWs mit variierender Dicke  $d$  mit  $d = 1, 2, 3, 4\text{ nm}$ . Die aktive

## KAPITEL 5. UNTERSUCHUNG DES MQW-DESIGNS VON ALGAN-UVC-HETEROSTRUKTUREN

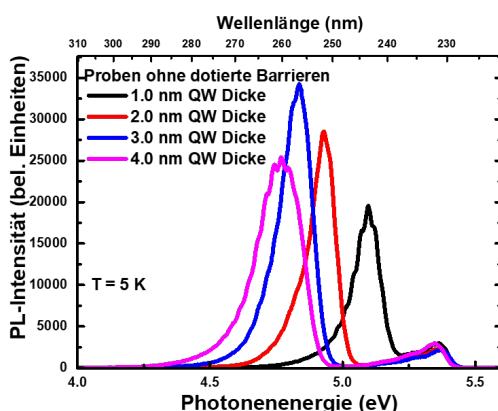
---

Zone befindet sich zwischen zwei  $40\text{ nm}$  dicken  $\text{Al}_{0.81}\text{Ga}_{0.19}\text{N}$ -Barrieren von der eine die oberste Schicht darstellt. Darunter folgt eine AlN (100%)-Bufferschicht die auf einem ELO-AlN/Saphir Substrat aufgewachsen wurde.

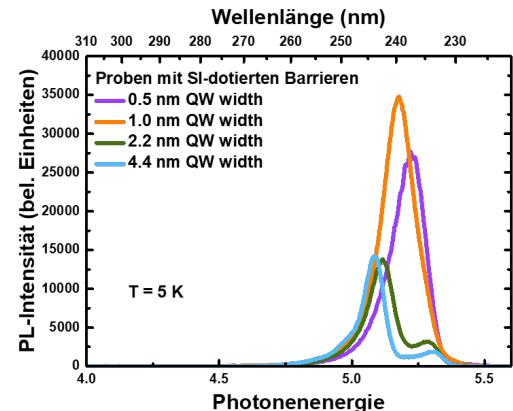
Abbildung 5.2 zeigt den Aufbau der Proben mit dotierten Barrieren. Die aktive Zone setzt sich aus zwei  $5\text{ nm}$  dicken und Si-dotierten  $\text{Al}_{0.83}\text{Ga}_{0.17}\text{N} : \text{Si}$ -Barrieren zwischen den drei  $\text{Al}_{0.72}\text{Ga}_{0.36}\text{N}$  QWs mit variierender Dicke  $d$  mit  $d = 0.5, 1.0, 2.2, 4\text{ nm}$ . Die aktive Zone befindet sich zwischen zwei  $40\text{ nm}$  dicken und Si-dotierten  $\text{Al}_{0.81}\text{Ga}_{0.19}\text{N} : \text{Si}$ -Barrieren von der eine die oberste Schicht darstellt. Darunter folgt eine AlN (100%)-Bufferschicht die auf einem ELO-AlN/Saphir Substrat aufgewachsen wurde.

## 5.2 Ergebnisse

Für die experimentelle Untersuchung wurden Photolumineszenzmessungen bei Tief-temperatur gemacht und die Spektren aufgenommen. In den Spektren, die die Abbildungen 5.3 und 5.4 zeigen, ist deutlich zu erkennen, dass mit sinkender QW-Dicke  $d$  die Emissionsenergie steigt.



**Abbildung 5.3:** PL-Spektren der untersuchten MQW-Proben ohne dotierte Barrieren.

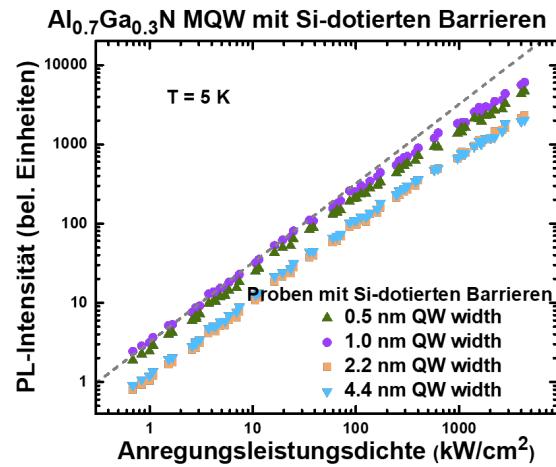
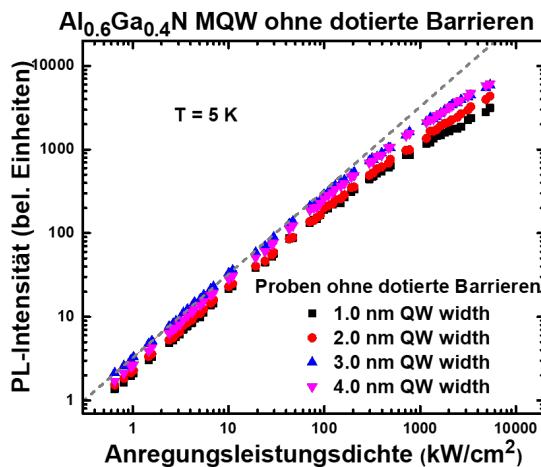


**Abbildung 5.4:** PL-Spektren der untersuchten MQW-Proben mit dotierten Barrieren.

Die Gründe hierfür sind die Übergangsenergien die mit steigender QW-Dicke [45] sinken. Die Emissionsenergien fallen im Vergleich deutlich unterschiedlich aus, da die aktiven Zonen beider Serien unterschiedliche Zusammensetzungen (siehe Abb.

5.1 und 5.2) haben.

In den Abbildungen 5.5 und 5.6 ist die integrierte Intensität in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur für die Proben mit undotierter und dotierter Barriere in doppeltlogarithmischer Darstellung dargestellt.



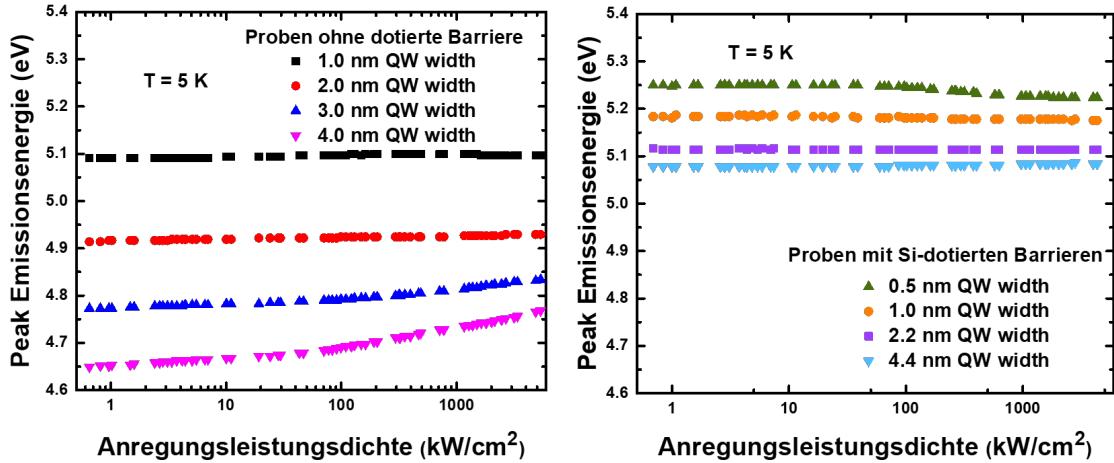
**Abbildung 5.5:** Integrierte Intensität in doppeltlogarithmischer Darstellung in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur für die Proben mit undotierter Barriere.

**Abbildung 5.6:** Integrierte Intensität in doppeltlogarithmischer Darstellung in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur für die Proben mit dotierter Barriere.

Im Bereich geringer Anregungsleistungsdichten zeigt sich für beide Serien eine lineare Steigung (gestrichelte Linie) die mit zunehmender Anregungsleistungsdichte ein nichtlinearen Verlauf annimmt der auf die Auger-Rekombination zurückzuführen ist (siehe Kapitel 4). Die integrierten Intensitäten befinden sich für die Proben mit undotierter Barriere bei Tieftemperatur für alle QW-Dicken auf dem selben Niveau. Die Proben mit einer QW-Dicke von  $3,0\text{ nm}$  und  $4,0\text{ nm}$  leuchten am hellsten und darauf folgen die Proben mit  $2,0\text{ nm}$  und  $1,0\text{ nm}$  QW-Dicke. Die Unterschiede sind aber marginal und im Rahmen der Streuung, die durch die unterschiedlichen Fokussierungen und Position im PL-Aufbau zu erwarten sind. Gleiches gilt für die Proben mit dotierter Barriere. Dort fallen die Proben mit QW-Dicken von  $2,2\text{ nm}$  und  $4,4\text{ nm}$  deutlicher ab, jedoch in einem unbedenklichen Maß.

## KAPITEL 5. UNTERSUCHUNG DES MQW-DESIGNS VON ALGAN-UVC-HETEROSTRUKTUREN

---



**Abbildung 5.7:** Peak Emissionsenergie in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur der untersuchten MQW-Proben ohne dotierte Barrieren.

**Abbildung 5.8:** Peak Emissionsenergie in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur der untersuchten MQW-Proben mit dotierten Barrieren.

Die Abbildungen 5.7 und 5.8 zeigen die Peak-Emissionsenergie des QW in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte für die Proben mit und un-dotierten Barrieren bei Tieftemperatur.

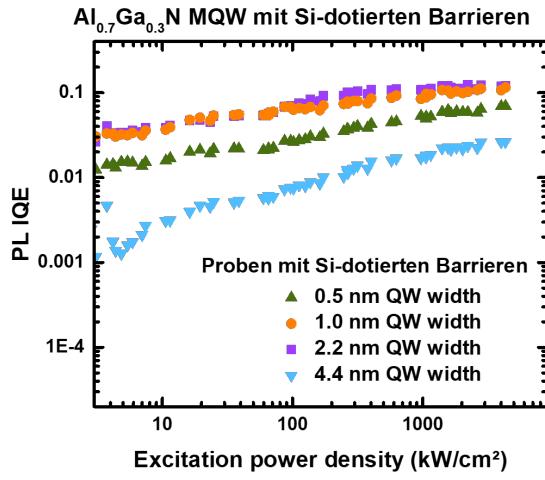
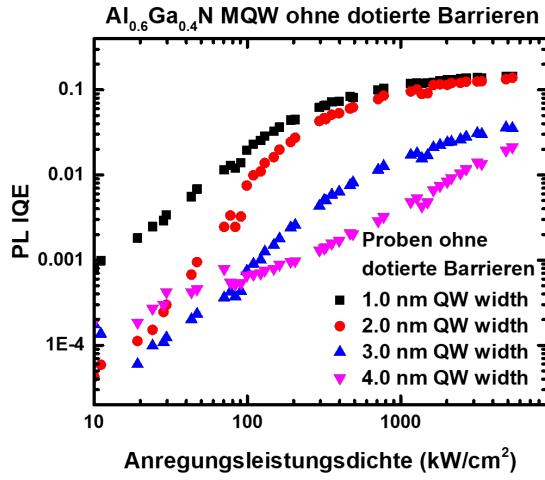
Für die Proben mit undotierten Barrieren ist zu erkennen, dass mit steigender Anregungsleistungsdichte die Emissionsenergie steigt. Der Grund hierfür ist das Screening des QCSE. Dieser Effekt wird größer mit kleiner werdender QW-Dicke, weil mit kleinerer QW-Dicke eine geringere Ladungsträgerdichte im QW notwendig ist, um die Bandverbiegung durch QCSE aufzuheben.

So ist die Verschiebung der Peak-Emissionsenergien bei der Probe mit einer QW-Dicke von  $5\text{ nm}$  von  $4,65\text{ eV}$  bei der geringsten Anregungsleistungsdichte zu  $4,77\text{ eV}$  bei der höchsten Anregungsleistungsdichte am stärksten. Die Probe mit einer QW-Dicke von  $1\text{ nm}$  zeigt dagegen keine Verschiebung der Peak-Emissionsenergien.

Die Proben mit dotierten Barrieren zeigen dagegen ein anderes Verhalten, so sind die Peak-Emissionsenergien für die Proben mit einer QW-Dicke von  $1,0\text{ nm}$ ,  $2,2\text{ nm}$  und  $4,4\text{ nm}$  nahezu konstant über den ganzen Bereich der Anregungsleistungsdichte, aber die Emissionsenergie der Probe mit der geringsten QW-Dicke von  $0,5\text{ nm}$  verschiebt sich mit steigender Anregungsleistungsdichte hin zu kleineren Energie. Die Gründe für dieses Verhalten sind bisher unklar.

## KAPITEL 5. UNTERSUCHUNG DES MQW-DESIGNS VON ALGAN-UVC-HETEROSTRUKTUREN

---



**Abbildung 5.9:** IQE in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Raumtemperatur der untersuchten MQW-Proben ohne dotierte Barrieren.

**Abbildung 5.10:** IQE in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Raumtemperatur der untersuchten MQW-Proben.

Die Ergebnisse der IQE bei Raumtemperatur für die Proben ohne und mit dotierten Barrieren sind in den Abbildungen 5.9 und 5.10 zu sehen. Für beide Probenserien zeigt sich, dass aufgrund des QCSE die IQE für weite QWs (3.0 – 4.0 nm) geringer ausfällt und für besonders geringe Dicken (0.5 nm), wahrscheinlich durch den schlechteren Ladungsträgereinschluss, ebenfalls. Die höchste IQE wird für QW-Dicken von 1.0 nm – 2.2 nm gemessen. Die Proben ohne dotierte Barrieren haben eine IQE von ca. 0,145 bei höchster Anregungsleistungsdichte für die Proben mit QW-Dicken von 1.0 nm und 2.0 nm.

Die Proben mit dotierten Barrieren haben eine IQE von ca. 0,121 bei höchster Anregungsleistungsdichte für die Proben mit QW-Dicken von 1.0 nm und 2.2 nm. Anhand der Ergebnisse für die Proben mit dotierten Barrieren ist zu erkennen, dass die Si-dotierung einen deutlichen Einfluss auf den Verlauf der IQE hat, so ist die Ordinate der IQEs für diese Proben deutlich höher, wie Abbildung 5.10 zeigt. Die Dotierung führt sichtbar zu höheren IQEs bei geringen Anregungsleistungsdichten die Steigung mit anwachsender Anregungsleistungsdichte ist aber im Vergleich geringer, sodass die IQEs für beide Serien ungefähr den selben Wert einnehmen.

### 5.3 Einfluss der Siliziumdotierung auf die IQE

Nun soll das ABC-Modell erweitert werden um damit die höhere Ordinate in der IQE für die dotierten Proben zu erklären.

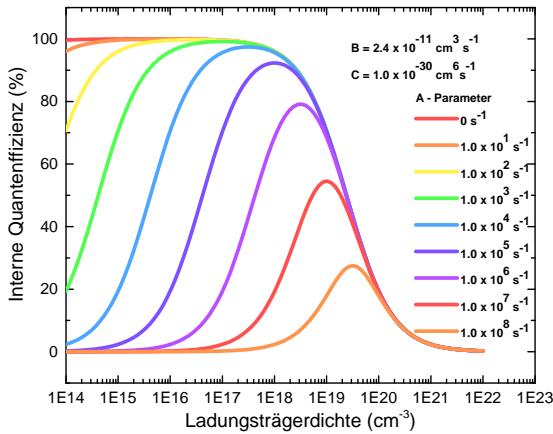


Abbildung 5.11: Die Grafik zeigt

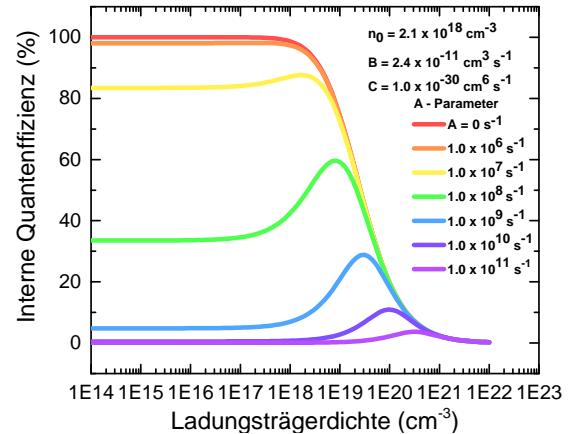


Abbildung 5.12: Die Grafik zeigt

Das ABC-Modell stellt nur eine Vereinfachung dar und berücksichtigt nicht alle vorkommenden Effekte wie beispielsweise Lokalisierung, Screening durch Ladungsträger und Dotierung. Der Effekt der Dotierung spielt dabei eine besonders wichtige Rolle, da eine Siliziumdotierung üblich in UV-LEDs ist und einen großen Einfluss hat. Nach [29] kann gezeigt werden, dass die Ratengleichungen, mit der Annahme einer Dotierung für die Radiative Rekombination sich ändert und soll nun hergeleitet werden:

Jeder dotierte oder undotierte Halbleiter hat zwei Arten von Ladungsträgern, Elektronen und Löcher. Im Gleichgewicht, bedeutet ohne externe Anregung durch Absorption von Licht oder Injektion von Elektronen, ist das Produkt von Elektronen- und Lochkonzentration eine konstante Größe.

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2 \quad (5.1)$$

Hierbei sind  $n_0$  und  $p_0$  die Elektron- und Lochkonzentration unter Gleichgewichtsbedingung und  $n_i$  damit die intrinsische Ladungsträgerkonzentration. Werden zusätzlich die durch Anregung erzeugten Ladungsträger betrachtet, so ist die Gesamtladungsträgerkonzentration gegeben als Summe der Anregungs- und Gleich-

## KAPITEL 5. UNTERSUCHUNG DES MQW-DESIGNS VON ALGAN-UVC-HETEROSTRUKTUREN

---

gewichtsladungsträger.

$$n_{ges} = n_0 + n \text{ und } p_{ges} = p_0 + n \quad (5.2)$$

Hierbei sind  $n$  und  $p$  die Anregungsladungsträger. Die Anzahl der stattfindenden Rekombination zwischen Elektronen und Löchern sind direkt proportional zur Elektronen- und Ladungsträgerkonzentration, so gilt,  $R \propto n \cdot p$ . Mit einer Proportionalitätskonstante, wird die Rekombinationsrate pro Zeit und Volumen definiert als

$$R = -\frac{dn_{ges}}{dt} = -\frac{dp_{ges}}{dt} = B \cdot n_{ges} \cdot p_{ges} \quad (5.3)$$

Weil Elektronen und Löcher bei Anregung paarweise erzeugt werden und verschwinden (durch Rekombination), gilt

$$n(t) = p(t) \quad (5.4)$$

Die radiative Rekombinationsrate wird dann mit  $p_0 = 0$  und Gleichung 5.4 zu

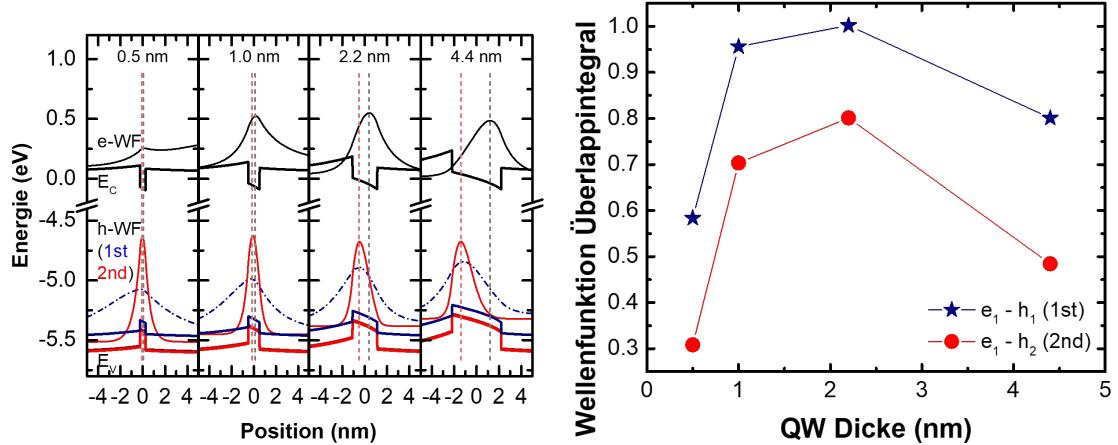
$$\begin{aligned} R_{rad} &= B \cdot (n_0 + n) \cdot (p_0 + p), \\ R_{rad} &= B \cdot (n_0 + n) \cdot (n), \\ R_{rad} &= B \cdot n^2 \cdot n \cdot n_0 \end{aligned} \quad (5.5)$$

Dabei beschreibt  $n_0$  die Ladungsträgerkonzentration durch die Siliziumdotierung. Somit wird die IQE zu:

$$IQE = \frac{B \cdot n^2 + B \cdot n \cdot n_0}{A \cdot n + B \cdot n^2 + B \cdot n \cdot n_0 + C \cdot n^3} \quad (5.6)$$

Und hat einen enormen Einfluss auf die Ordinate, wie in Abb. 5.12 zu sehen ist.

## 5.4 Ergebnisse der Simulationen



**Abbildung 5.13:** Simulation der Elektron- und Lochwellenfunktion im Bändermodell mit QW in einem Bereich von  $-4$  bis  $4\text{ nm}$  für verschiedene Dicken. Simulation von Christoph Reich.

**Abbildung 5.14:** Wellenfunktion Überlapointegral in Abhängigkeit der QW-Dicke. Simulation von Christoph Reich.

Abbildung und zeigen Modellberechnungen von Christoph Reich basierend auf der  $k \cdot p$ -Theorie für variierende QW-Dicken. Die Simulation bestätigt, dass für eine QW-Dicke von  $0,5\text{ nm}$  die IQE wegen kleinerem Ladungsträgereinschluss geringer ausfällt und dass durch den QCSE die Separation von Elektron- und Lochwellenfunktion steigt. Dies führt zur Reduktion der strahlenden Rekombinationsrate und bedeutet, dass die IQE für weite QWs geringer ausfällt. Die Simulation bestätigt ebenfalls, dass QW-Dicken zwischen  $1.0\text{ nm} - 2.2\text{ nm}$  die beste Grundlage für die Verwendung in LEDs darstellen.

## 5.5 Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieses Kapitels zeigen, dass die QW-Dicke einen eindeutigen Einfluss auf die Rekombination und damit auf die IQE hat. Es wurde gezeigt, dass QW-Dicken von  $1.0\text{ nm} - 2.2\text{ nm}$  die höchsten IQEs liefern. Diese liegen für die Proben mit dotierten und undotierten Barrieren zwischen 0,121 und 0,145 und

## KAPITEL 5. UNTERSUCHUNG DES MQW-DESIGNS VON ALGAN-UVC-HETEROSTRUKTUREN

---

sind damit auf einem ähnlichen Niveau. Die Dotierung führt nur im Bereich geringer Anregungsleistungsdichten zu höheren IQEs. Weiter wurde gezeigt, dass die Emissionsenergien der undotierten Proben durch das Screening des QCSE steigen mit zunehmender Ladungsträgerdichte. Die Proben mit dotierten Barrieren zeigen dagegen ein anderes Verhalten, dessen Ursprung nicht geklärt werden konnte.

KAPITEL 5. UNTERSUCHUNG DES MQW-DESIGNS VON  
ALGAN-UVC-HETEROSTRUKTUREN

---

# Kapitel 6

## Untersuchung optisch gepumpter Laserstrukturen auf unterschiedlichen Templates

### 6.1 Einleitung

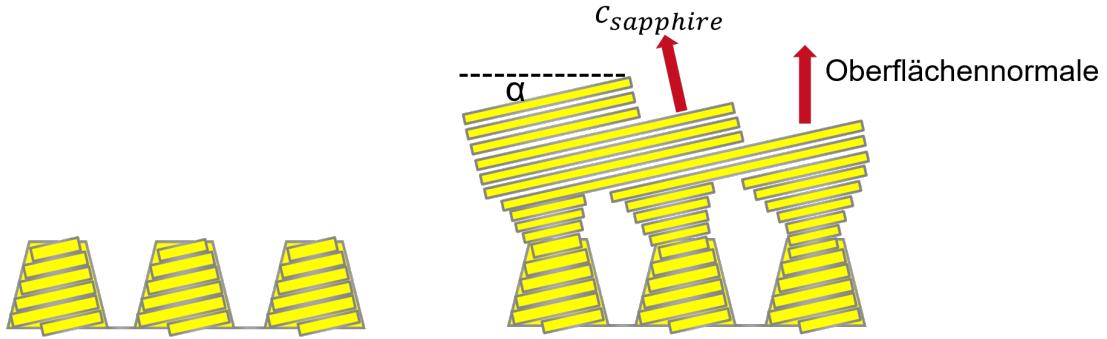
Dieses Kapitel widmet sich der Untersuchung zweier Probenreihen von optisch gepumpten Laserstrukturen, die aus Rezepten aus zwei unterschiedlichen Serien stammen. Die beiden Serien unterscheiden sich im wesentlichen dadurch, dass sie mit(Serie 2) und ohne Übergitter(Serie 1) gewachsen wurden. Sie haben alle eine aktive Zone, die sich zusammen setzt aus zwei 5nm dicken und siliziumdotierten  $Al_{0.8}Ga_{0.3}N$ -Barrieren zwischen den drei 2.2nm dicken  $Al_{0.56}Ga_{0.44}N$  QWs. Die aktive Zone befindet sich zwischen einem 30 nm dicken  $Al_{0.70}Ga_{0.30}N$  und einem 85 nm dicken Waveguide als oberste Schicht. Der Wellenleiter hat den Zweck, die optische Mode einzuschließen, daher ist ein hoher Brechungsindexsprung zwischen den Barrieren der aktiven Region und der darüberliegenden Schichten notwendig. Dieser Block an Schichten bildet die unveränderte Grundlage für alle in diesem Kapitel untersuchten Proben.

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

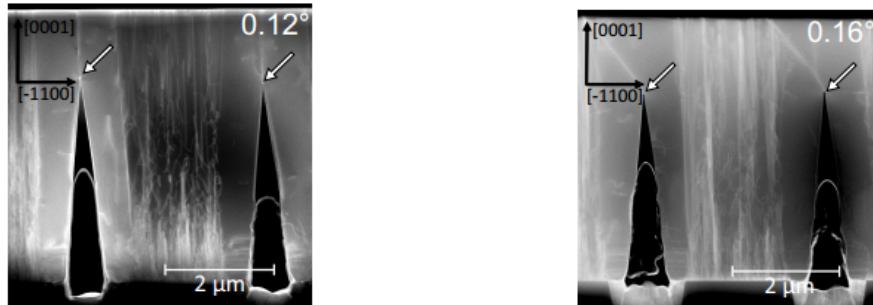
---

Serie 1		Serie 2	
Name	offcut	Name	offcut
A	0.1°m	A-SL	0.1°m
B	0.1°m*	B-SL	0.1°m*
C	0.2°m	C-SL	0.2°m

Die Proben beider Serien mit dem ELO AlN/Saphir Substrat unterscheiden sich untereinander noch vom Fehlschnitt und der Richtung des Fehlschnittes des Substrats. Die gegebenen Werte stammen vom Hersteller und sind nur nominelle Werte die sich von den realen unterscheiden können. So haben die mit A gekennzeichneten Proben einen nominellen Fehlschnitt von  $\alpha = 0.1^\circ m$  in die Standard m-Richtung, die mit B gekennzeichneten Proben den selben Fehlschnitt in eine der sechs nicht Standard m-Richtungen und die mit C gekennzeichneten Proben einen Fehlschnitt von  $\alpha = 0.2^\circ m$  in die Standard m-Richtung. Die Untersuchung des Einflusses des Fehlschnitt-Winkels des Substrates, ist insofern interessant, da dieser eine entscheidende Rolle beim Wachstum der Heterostrukturen spielt. Er erlaubt es die Wachstumskinetik zu steuern, so dass sich die Schichten in die kristalline Struktur formen wie in Abbildung 6.1 zu sehen ist. Der Fehlschnitt-Winkel  $\alpha$  ist die Winkel-Differenz zwischen Oberflächennormale und der c-Richtung. Für ein  $\alpha \leq 0,12$  wurde gezeigt, dass es zu Stufenfluss kommt und somit zu relativ glatten Oberflächen mit wellenartiger Morphologie und mit  $\alpha \geq 0,16$  in Stufenbündelwachstum mit Makrostufen resultieren kann. Dies ist nicht unwichtig für Laserstrukturen, da glatte Oberflächen optische Streuung an der Oberfläche verringern, sollten aber keinen Effekt auf die IQE haben. Allerdings kann an den Stufenkanten verstärkt Ga eingebaut und somit die Zusammensetzung der aktiven Zone inhomogen werden [17] [18] [46], was wiederum einen Einfluss auf die IQE durch Lokalisierung haben könnte. Die Makrostufen können zudem zu einer Reduktion der TDD beitragen, die wiederum in der IQE sichtbar ist wie Abbildung 2.7 zeigt. Bei Proben mit einem geringen Fehlschnitt von  $\alpha = 0,12$  verlaufen die Versetzungen senkrecht zur Kristalloberfläche. Bei Proben mit einem großen Fehlschnitt von  $\alpha = 0,16$  verlaufen die Versetzungen diagonal wie Abbildung ?? zeigt. Bei diesen Versetzungen handelt es sich um sogenannten Koaleszenzkorngrenzen die an der Oberfläche als Makrostufen zu erkennen sind [18]. Bei Schichtdicken  $\geq 10\mu m$  kreuzen diese diagonal verlaufenden Makrostufen die versetzungsreichen

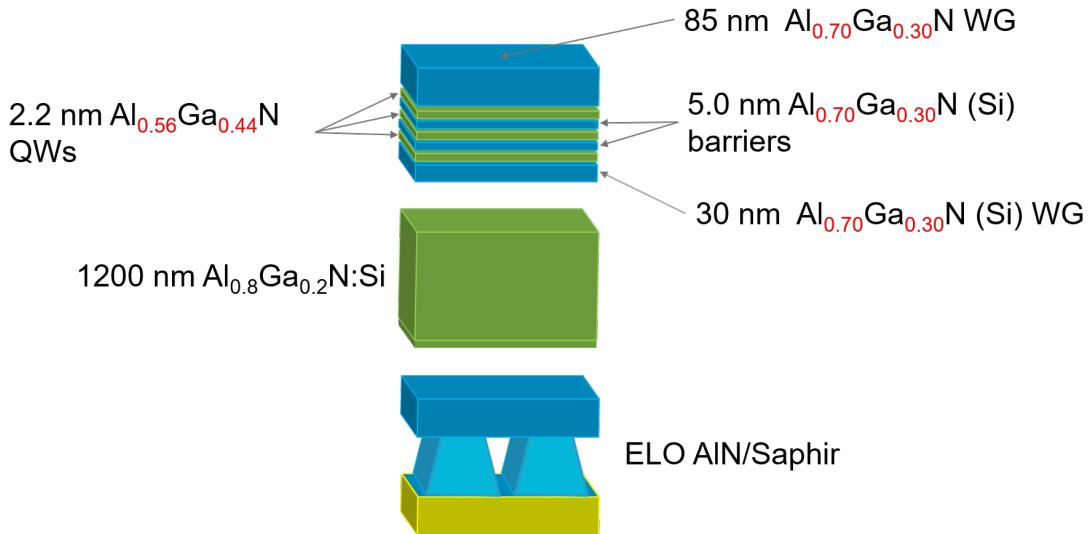


**Abbildung 6.1:** Einfluss des Fehlschnitt-Winkels auf das Wachstum bei ELO AlN/Saphir.



**Abbildung 6.2:** Querschnitts-TEM-Aufnahmen mit den sichtbaren senkrecht und diagonal verlaufenden Schraubenversetzungen

Gebiete zwischen den geätzten Gräben im ELO oft genug um diese fast vollständig zu annihilieren [46]. Solche Dicken sind aber schwierig zu realisieren durch das schwierige Wachstum und der entstehenden Krümmung des Wafers. Bei den hier verwendeten Schichtdicken von  $\geq 1 \mu\text{m}$  ist nur eine teilweise Annihilation und damit eine Defektreduktion von  $1 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$  auf  $5 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-2}$  zu erwarten [46]. Weiter beachtet werden muss, dass bei den darauf folgenden Schichten eine Planarisierung stattfinden muss, um eine möglichst ebene aktive Zone zu haben.



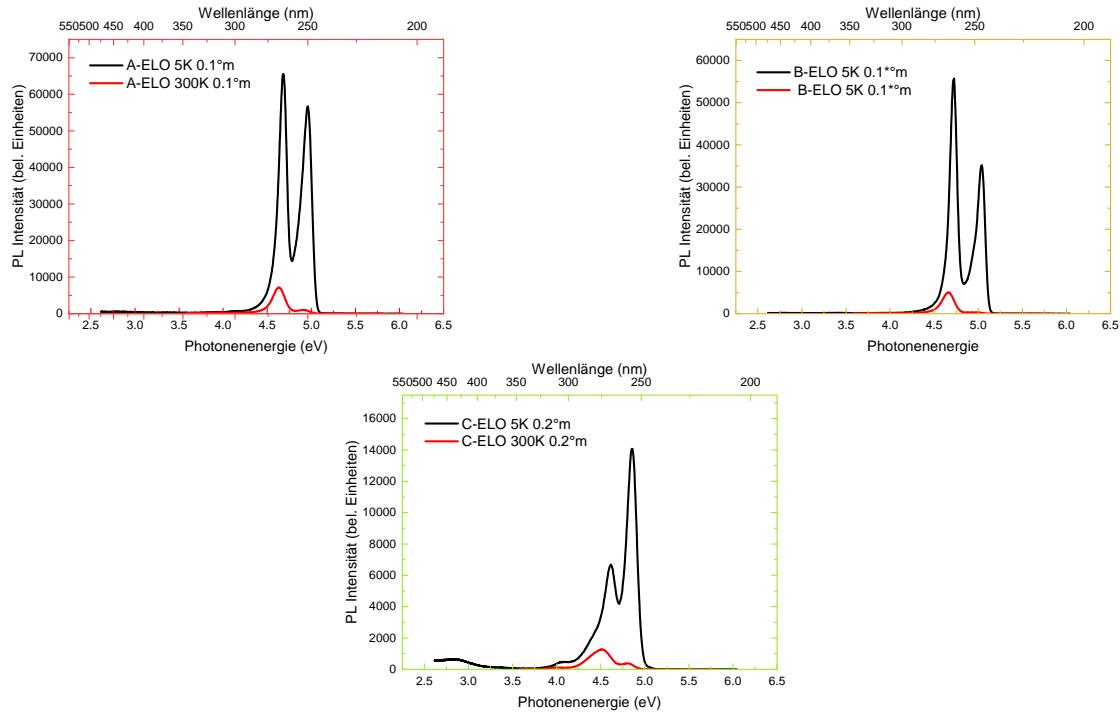
**Abbildung 6.3:** Schichtstruktur der untersuchten Proben.

## 6.2 UVC-Laser Strukturen auf ELO ohne Übergitter

Die drei untersuchten Proben A-ELO, B-ELO und C-ELO setzen sich zusammen aus der oben genannten aktiven Zone. Das Substrat ist ELO AlN/Saphir und darauf aufgewachsen wurde eine  $1200\text{ nm}$  dicke  $Al_{0.8}Ga_{0.2}N$ -Bufferschicht (Abb. 6.10). Die zentrale Wellenlänge der Proben befindet sich bei  $(271 \pm 1)\text{ nm}$  wie in Abbildung 6.4 zu sehen ist. Durch die nicht resonante Anregung ist der QW-Peak und auch der QB-Peak bei Tieftemperatur bei allen Proben zu sehen, der Anteil des QB-Peaks sinkt aber mit steigender Temperatur durch die steigende kinetische Energie der Elektronen, die bevorzugt in die Leitungsbandminima (den QWs) wandern (thermisches Diffundieren). Die Probe C-ELO zeigt bei TT ein abweichendes Verhalten bezüglich der Verteilung der Intensität auf QB-Peak und QW-Peak. Ein möglicher Grund könnte die Fokussierung sein oder der oberste Waveguide der den gleichen Al-Gehalt hat wie die QBs, absorbiert einen Großteil des Lichtes bevor es in die QWs gelangt. Anhand der Intensitäten allein, ist noch kein Rückschluss auf die IQE der Proben zu schliessen., bedingt durch die unterschiedliche Positionierung der Proben und der Fokussierung. Dennoch ist hier bereits auffällig, dass die Probe C-ELO (grün) eine deutlich geringere Intensität bei RT und TT hat.

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPFTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

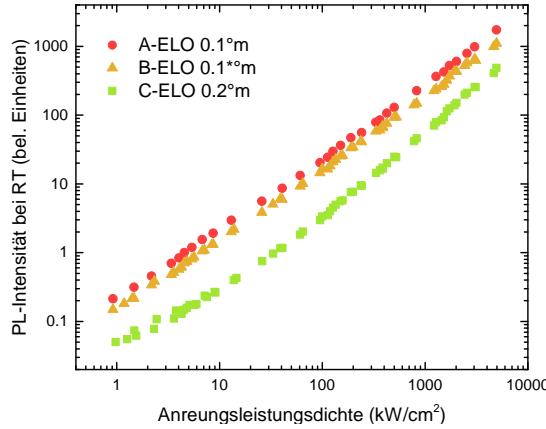


**Abbildung 6.4:** Aufnahme der Spektren der Proben A-ELO mit einem Fehlschnittwinkel von 0.1 in die Standard m-Richtung, Probe B-ELO mit einem Fehlschnittwinkel von 0.1 die andere m-Richtung und Probe C-ELO mit einem Fehlschnittwinkel von 0.2 in die standard m-Richtung.

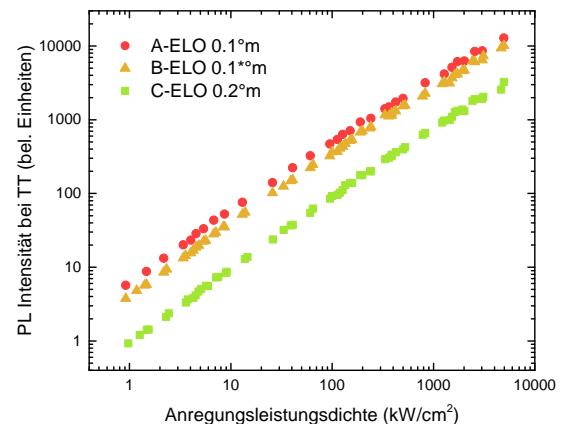
Dies bestätigt sich in den Abbildungen 6.12 und 6.6. Die Proben A-ELO und B-ELO zeigen keinen signifikanten Unterschied in den Intensitäten zueinander, der Rückschlüsse auf unterschiedliche IQEs erlauben würde. Bei der Probe C-ELO könnte vermutet werden, anhand der dramatischen Unterschiede in den Intensitäten der Spektren, dass sie die geringste IQE hat, da sie mit deutlichem Abstand am schwächsten leuchtet, obwohl bei allen Proben die gleiche Fläche beleuchtet wird.

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

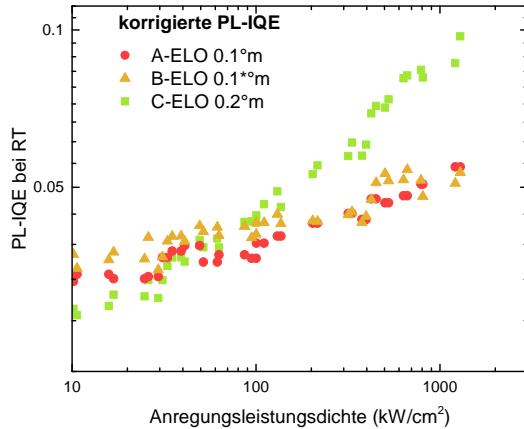
---



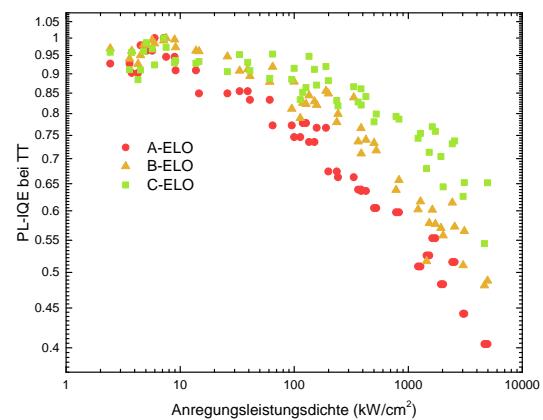
**Abbildung 6.5:** Die integrierte Intensität in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Raumtemperatur in doppelt-logarithmischer Darstellung.



**Abbildung 6.6:** Die integrierte Intensität in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur in doppelt-logarithmischer Darstellung.



**Abbildung 6.7:** Die IQEs für die Proben A-ELO, B-ELO und C-ELO bei Raumtemperatur.



**Abbildung 6.8:** Die IQEs für die Proben A-ELO, B-ELO und C-ELO bei Tieftemperatur.

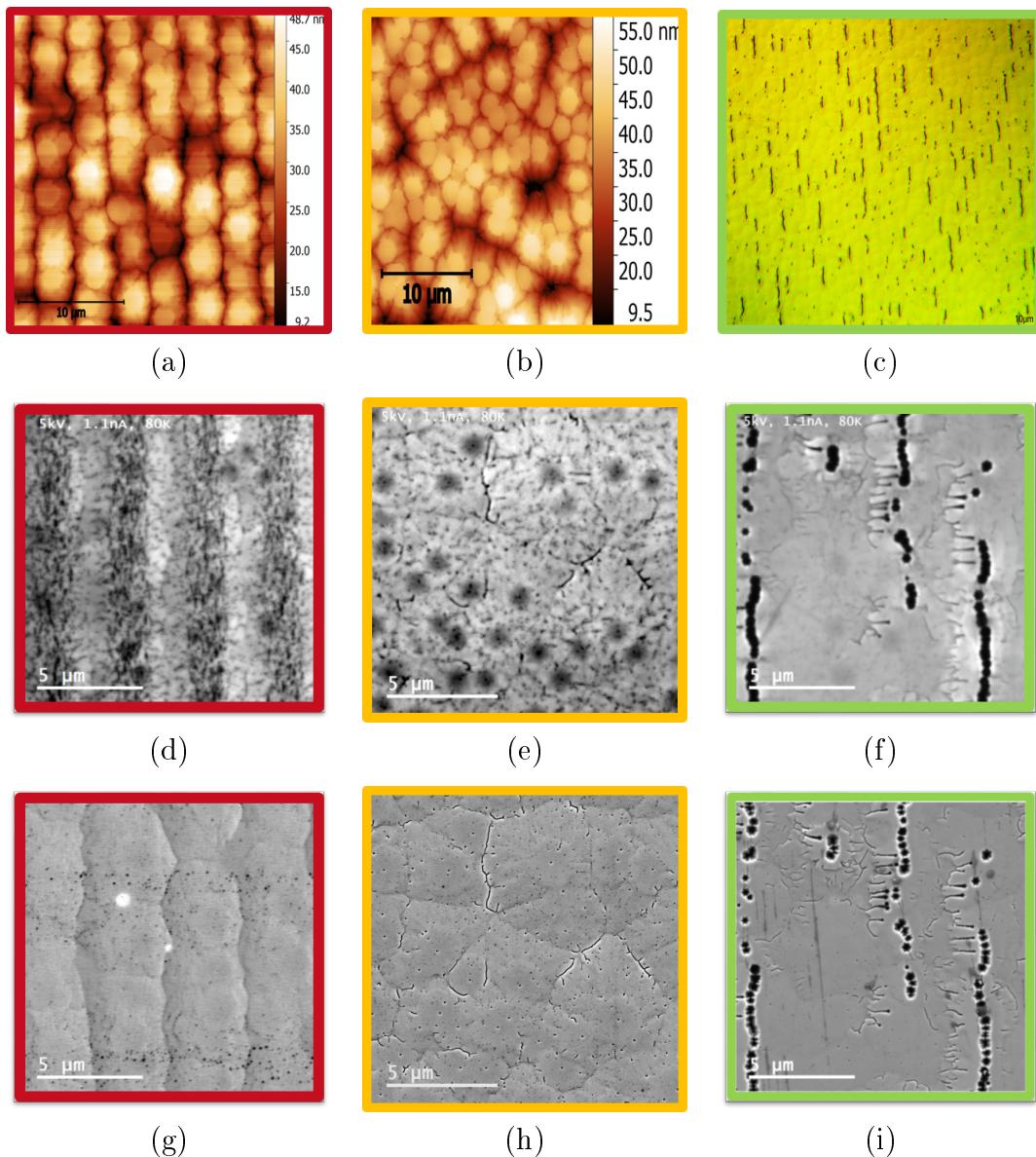
Die Ergebnisse für die IQE bei RT sind in Abbildung 6.14 zu sehen. Die IQE Probe C-ELO ist mit einem Wert von  $IQE_{C-ELO} = 0,028$  im Bereich von geringen Anregungsleistungsdichten von  $10 \frac{kW}{cm^2}$  bis  $100 \frac{kW}{cm^2}$  niedriger als für die Proben A-ELO und B-ELO, die sich, wie aus den Intensitäten und ihren Verhältnissen bei TT und RT bereits zu vermuten ist, ähnlich verhalten. Die IQE für die Probe C-ELO weist indes eine deutlich stärkere Steigung auf, sodass die IQE mit zunehmender Anregungsleistungsdichte die der Proben A-ELO und B-ELO immer deutlicher

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

übersteigt. Sodass bei der höchsten Anregungsleistungsdichte  $1300 \frac{kW}{cm^2}$  die IQE der Probe C-ELO mit einer IQE von  $IQE_{C-ELO} = 0,098$  (9,8 %) die der Proben A-ELO mit  $IQE_{A-ELO} = 0,055$  (5,5 %) und B-ELO mit  $IQE_{B-ELO} = 0,054$  (5,4 %) um fast das doppelte übersteigt. Werden zusätzlich die IQEs bei  $5K$  berachtet, ist ersichtlich, dass die IQEs Proben A-ELO und B-ELO erheblich schneller absinken als die der Probe C-ELO. Dieser erreicht mit sinkender Anregungsleistungsdichte das Plataeu , dass bei geringen Anregungsleistungen aufgrund der  $n^3$  Abhängigkeit der Auger-Rekombination zu erwarten ist. A-ELO und C-ELO dagegen scheinen dieses Plataeu nicht zu erreichen. Daraus resultierend, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die hier verwendeten Anregungsleistungsdichten für die Proben A-ELO und B-ELO nicht gering genug und somit die IQEs unterbewertet sind, zudem ist das unterschiedliche Verhalten der IQEs bei  $5K$  möglicherweise dadurch zu erklären, dass auf die Probe C-ELO nicht die gleiche Anzahl an Ladungsträgern die aktive Zone erreichen. Was im Umkehrschluss erklärt, wieso das Plataeu bei der Probe C-ELO früher erreicht wird, da somit die tatsächlich auf der Probe ankommende Anregungsleistungsdichte geringer ausfällt.

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES



**Abbildung 6.9:** AFM-Bilder (a, b) und eine Limi-Aufnahme (c) von Christian Kuhn aufgenommen. SEM (c, d, e) und panchromatische CL-Aufnahmen(f, g, h) an den selben Stellen gemessen von Ute Zeimer (FBH)

Um die Gründe für diese Unterschiede in den IQEs und den Einfluss des Fehlschnittes auf die Oberflächenmorphologie weiter zu untersuchen, werden AFM-Aufnahmen und panchromatische CL-Aufnahmen und dazu von derselben Stelle Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen betrachtet und auf ihre Besonderheiten

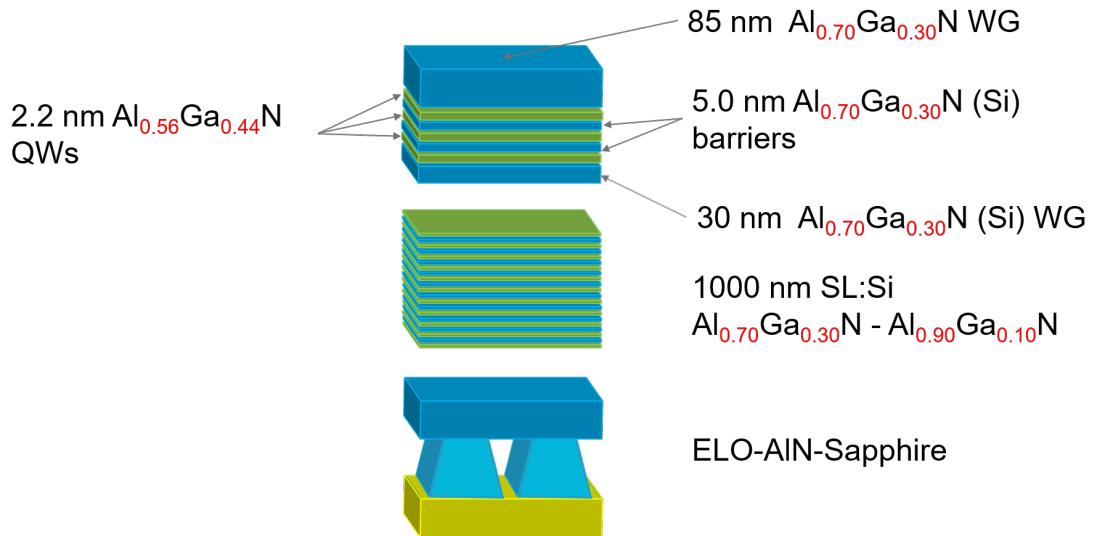
## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

analysiert. Die CL-Bilder wurden bei einer Beschleunigungsspannung von 5 kV, einer Stromstärke von 1,1 nA und einer 5000-fachen Vergrößerung von Ute Zeimer aufgenommen. Auf den AFM-Aufnahmen der Probe A-ELO in Abbildung 6.9 (a) sind entlang der ELO-Streifen Spiralen zu sehen und die SEM-Aufnahme (c) zeigen Wachstumssinseln und eine glatte Oberfläche. Die panchromatischen CL-Aufnahmen zeigen eine Verteilung dunkler Punkte (engl.: dark spot) hauptsächlich an den Kämmen der ELO-Streifen zwischen den geätzten Gräben. Diese korrelieren direkt mit Schraubenversetzungen die bis an die Oberfläche reichen. Auf der AFM-Aufnahme der Probe B-ELO (b) sehen wir statt den Spiralen auf den ELO-Streifen dagegen zufällig verteilte Spiralen. Der Grund dafür liegt hauptsächlich an dem Einfluss der unterschiedlichen Richtungen der ELO-Streifen zu der Fehlschnittrichtung. Die SEM-Aufnahme (g) zeigt viele Hohlräume und Risse an der Oberfläche. Auf dem panchromatischen CL-Bild (d) sind die dunklen Punkte verstreut auf der Oberfläche zu sehen. Die Oberfläche der Probe C-ELO dagegen weist, wie auf Abbildung (c) zu sehen ist, viele Gruben (engl.: pits) entlang der ELO Streifen auf. Das ELO ist zwar koalesziert, aber beim Wachstum der MQWs ist wahrscheinlich etwas schief gelaufen. Zudem ist wieder erwarten kein Stufenbündelwachstum zu sehen. Mit diesem Wissen lässt sich sagen, dass die Proben A-ELO und B-ELO mit dem gleichen Fehlschnitt in verschiedene Richtungen sich in ihren Emissions-Eigenschaften ähnlich verhalten und die IQEs mit 5,4 % und 5,5 % sich gleichen. Allerdings äußert sich an der Morphologie eindeutig der Einfluss der Fehlschnitt-Richtung zur Richtung der ELO Streifen. Die Ergebnisse der Probe C-ELO dagegen lassen sich schwer interpretieren. Sie besitzt eine fast doppelt so hohe IQE wie die anderen beiden Proben, bei einer geringeren Intensität. Auf der Probe selbst scheinen weniger Elektron-Loch-Paare generiert zu werden, was sich durch eben eine geringere Intensität äußert, aber untermauert wird durch die IQE bei 5K und dem bei weitem früher einsetzenden Plateau. Die Gründe dafür können schwer bestimmt werden. Beim Wachstum des MQW ist eindeutig etwas schief gelaufen und äußert sich in der Morphologie. Inwieweit die Morphologie einen Einfluss auf die Kollektionseffizienz (Licht- ein- und auskopplung) der Proben hat, ist schwierig und zu diesem Zeitpunkt nicht benennbar. So bleibt die IQE der Probe C-ELO ohne weitere Investigation schwer bis gar nicht zu verwerten. Um den tatsächlichen Einfluss eines Fehlschnittwinkels von 0.2° auf die Defektdichte und

damit eine IQE zu bestimmen, wäre es notwendig, eine neue Serie zu wachsen bei der das MQW-Wachstum nicht schief lief und zusätzlich Messungen in denen die maximale IQE bestimmt wird. Letzteres ist mit dem derzeitigen PL-Aufbau nicht möglich.

### 6.3 UVC-Laser Strukturen auf ELO mit Übergitter

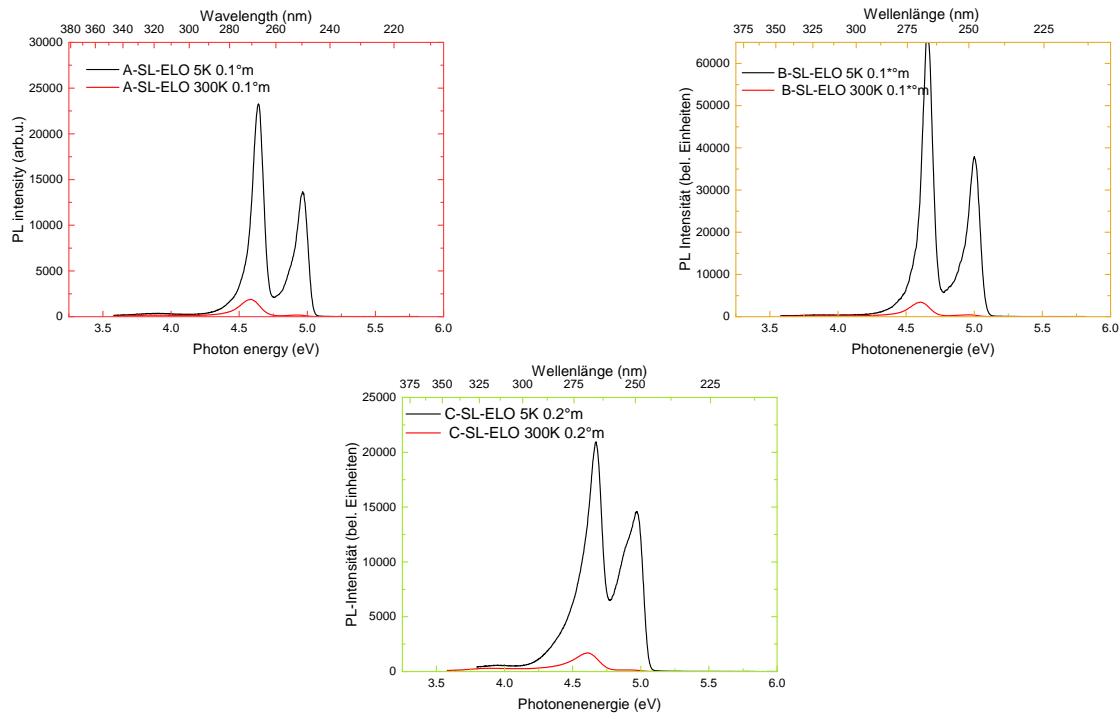


**Abbildung 6.10:** Schichtstruktur der untersuchten Proben.

Die drei untersuchten Proben A-SL-ELO, B-SL-ELO und C-SL-ELO setzen sich zusammen aus der gleichen aktiven Zone. Das Substrat ist ELO AlN/Saphir und darauf aufgewachsen wurde ein 1000 nm dicker Übergitter aus dünnen alternierenden Schichten aus  $\text{Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{N}$  und  $\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{N}$ , da so Wachstum von AlGaN-Schichten mit einer verbesserten lateralen Uniformität in der Zusammensetzung und des Spannungszustands ermöglicht wird und so zu einer signifikanten Reduzierung der Oberflächenrauheit führt [47] [48]. Dies ist bei Laserdioden von besonderer Wichtigkeit um optische Streuung, die zu Verlusten im Resonator führt, möglichst zu vermeiden. So ist durch eine glattere Oberfläche eine geringere Laserschwellendichte zu erreichen [49]. Die Spektren bei 5K und 300K zeigen keine signifikanten

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPFTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

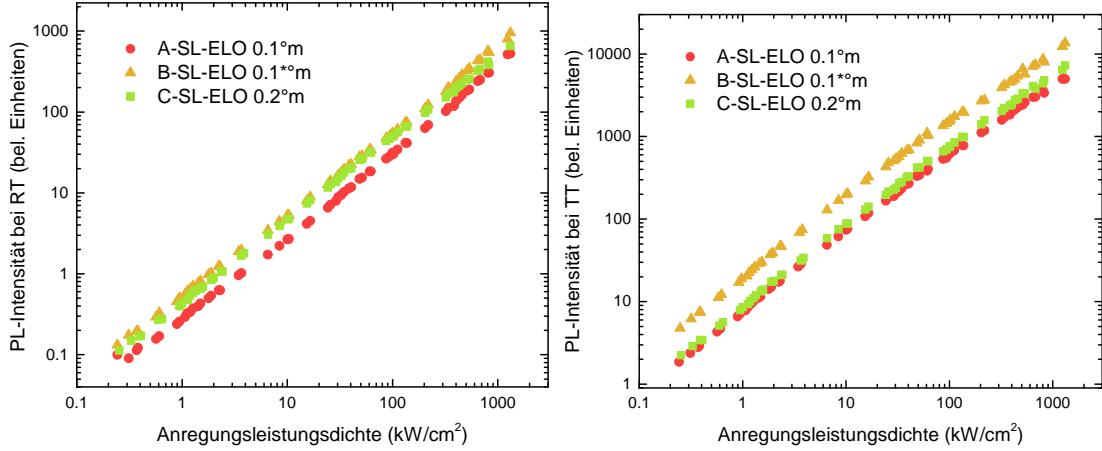


**Abbildung 6.11:** Aufnahme der Spektren der Proben A-SL-ELO mit einem Fehlschnittwinkel von 0.1 in die Standard m-Richtung, Probe B-SL-ELO mit einem Fehlschnittwinkel von 0.1 die andere m-Richtung und Probe C-SL-ELO mit einem Fehlschnittwinkel von 0.2 in die standard m-Richtung.

Unterschiede in der Intensität wie in Abbildung 6.11 zu sehen ist. Der QB-Peak der Probe C-SL-ELO ist energetisch näher am QW-Peak als bei den anderen Proben und weist eine andere Form auf, nimmt aber keinen Einfluss auf die Ergebnisse der IQE.

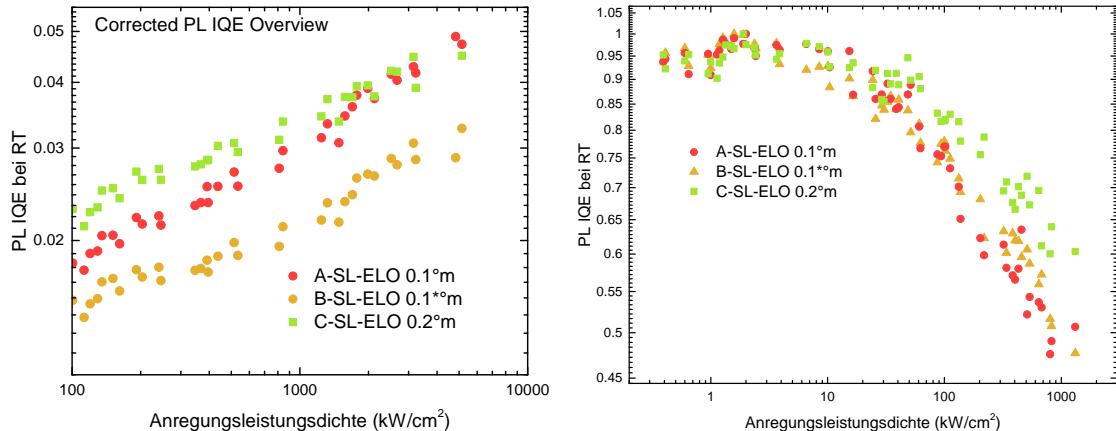
## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---



**Abbildung 6.12:** Die integrierte Intensität in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Raumtemperatur in doppelt-logarithmischer Darstellung.  
**Abbildung 6.13:** Die integrierte Intensität in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte bei Tieftemperatur in doppelt-logarithmischer Darstellung.

Die integrierten Intensitäten in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte (Abb. ??) zeigen, dass die Probe B-SL-ELO bei TT am stärksten leuchtet und bei Raumtemperatur auf gleichem Niveau mit der Probe A-SL-ELO ist. Die Probe C-SL-ELO leuchtet dagegen im Vergleich bei TT und RT am schwächsten, fällt allerdings nicht so signifikant gering gegenüber den anderen Proben aus, wie die Probe C-ELO aus der ersten Serie.



**Abbildung 6.14:** Die IQEs für die Proben A-SL-ELO, B-SL-ELO und C-SL-ELO bei Raumtemperatur.

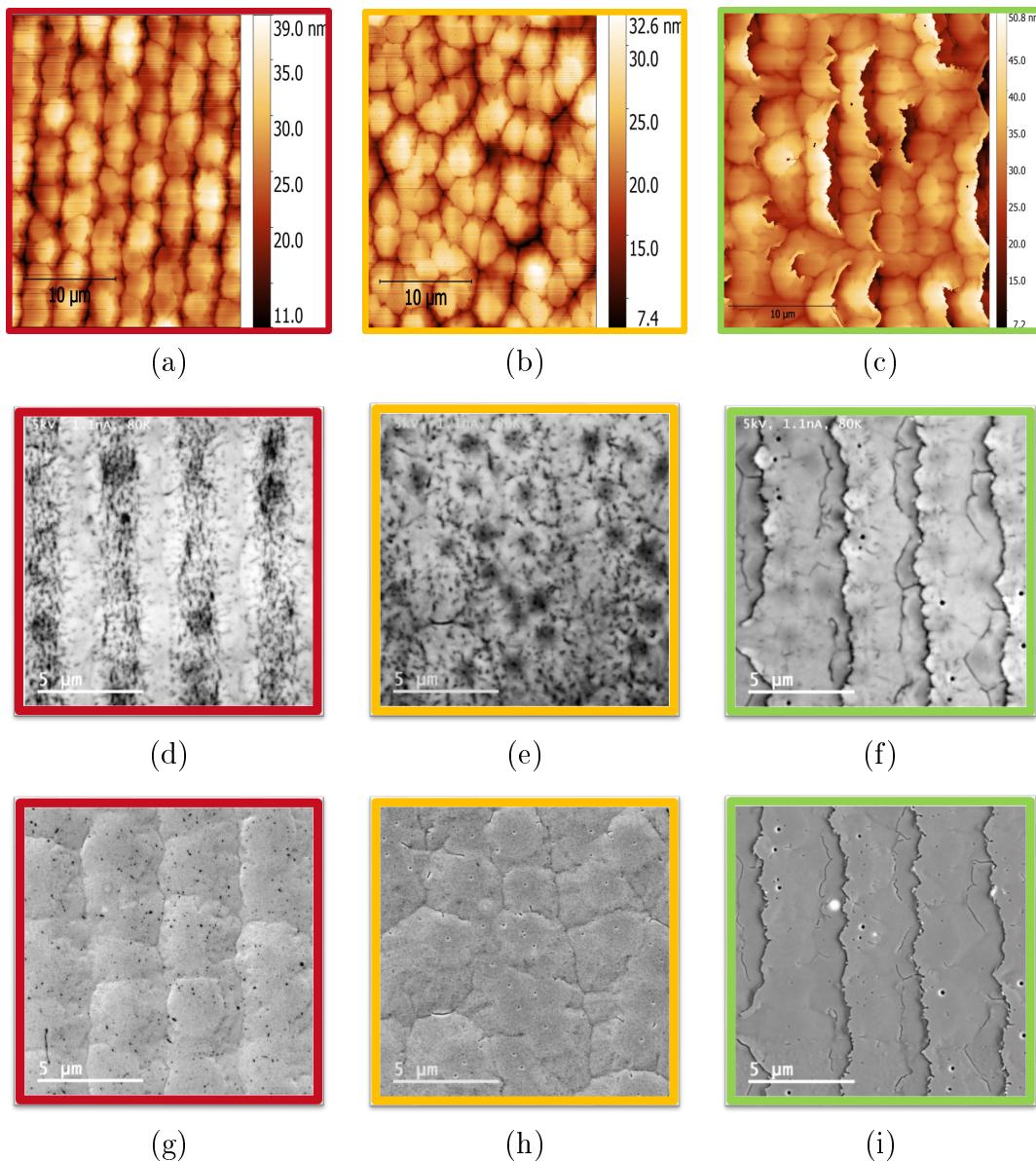
**Abbildung 6.15:** Die IQEs für die Proben A-SL-ELO, B-SL-ELO und C-SL-ELO Tieftemperatur.

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

Die IQEs der Proben bei RT und TT sind in Abbildung 6.14 und 6.15 zu sehen und zeigen, dass die Proben A-SL-ELO und C-SL-ELO die höchsten IQEs haben. Die Probe C-SL-ELO weist bei geringen Anregungsleistungsdichten die höchste IQE auf. A-SL-ELO weist in Abhängigkeit der Anregungsleistungsdichte die größte Steigung auf, sodass bei der höchsten Anregungsleistungsdichte bei  $1300 \frac{kW}{cm^2}$  die IQEs beider Proben fast gleich sind mit  $IQE_{A-SL-ELO} = 0,049$  und  $IQE_{C-SL-ELO} = 0,045$ . C-SL-ELO fällt im Vergleich mit  $IQE_{C-SL-ELO} = 0,033$  stark ab.

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES



**Abbildung 6.16:** AFM-Bilder (a, b) und eine Limi-Aufnahme (c) von Christian Kuhn aufgenommen. SEM (c, d, e) und panchromatische CL-Aufnahmen(f, g, h) an den selben Stellen gemessen von Ute Zeimer (FBH)

Hatten beide Proben mit dem selben Fehlschnittwinkel von  $0,1^\circ$  in der ersten Serie noch nahezu die selben IQEs, weichen sie in dieser Serie deutlich von einander ab. Einen Grund dafür liefert möglicherweise die panchromatische-CL Aufnahme 6.16 (d) im Vergleich mit 6.9 (d). Dort ist erkennbar, dass die dunklen Punkte ebenfalls

verteilt auf der Oberfläche zu sehen sind, jedoch in 6.16 (d) die Anzahl kleinerer dunkler Punkte um die kreisförmig angesammelten dunklen Punkte deutlich höher ist. Was auf eine höhere Anzahl an Defekten spricht und somit die geringe IQE erklären würde. Die AFM-Bilder in Abbildung 6.16 (a) (b) (c) zeigen eine ähnliche aber glattere Oberflächenmorphologie wie in der ersten Serie für die Proben mit dem selben Fehlschnittwinkel- und richtung. A-SL-ELO zeigt wie die A-ELO Spiralen entlang der ELO-Streifen auf dem AFM-Bild (a) und auf dem CL-Bild (d) sieht man ebenso dunkle Punkte hauptsächlich an den Kämmen der ELO-Streifen zwischen den geätzten Gräben. B-SL-ELO hat wie Probe B-ELO zufällig verteilte Spiralen auf der Oberfläche (b). Die SEM-Aufnahme (h) zeigt im Unterschied zur SEM-Aufnahme der Probe B-ELO Gruben im Zentrum der Wachstumsinseln.

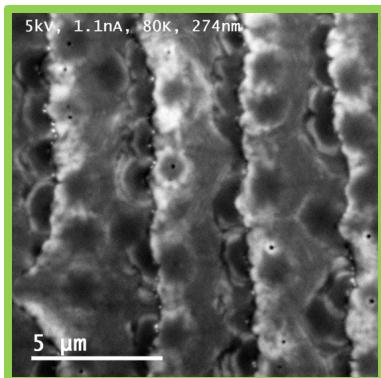


Abbildung 6.17: (a)

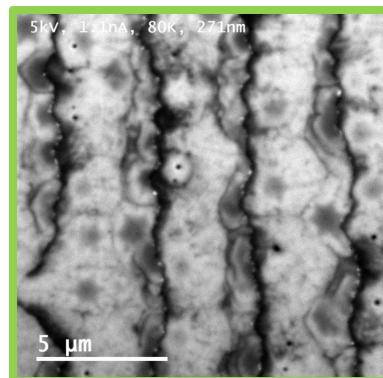


Abbildung 6.18: (b)

**Abbildung 6.19:** Monochromatische CL-Bilder aufgenommen bei 80 K bei 274 nm und 271 nm.

Die Probe C-SL-ELO dagegen unterscheidet sich stark von C-ELO bezüglich der Oberflächenmorphologie, so tritt sporadisches Stufenbündelwachstum auf, was für einen Fehlschnitt von  $0,14^\circ$ , also nah an der Grenze von Stufenfluss- zu Stufenbündelwachstum spricht. Der Einbau von Gallium an den Stufenkanten bestätigt sich in den Mono-CL Aufnahmen bei 274 nm und 271 nm(QW-Peak) bei TT (80K). So ist im Vergleich ersichtlich, dass Gallium an den Stufenkanten eingebaut wurde und zusätzlich sind noch pyramidenartige Strukturen mit Al-Gehalt zu sehen. Lokalisierungseffekte sind allerdings aufgrund der Diffusionslänge von ca. 100 nm nicht zu erwarten. Aber auch hier scheint es, wie bei Probe C-ELO, Unterschiede

in der Absorption der auf der Probe ankommenden Photonen zu geben, denn das Plateau der IQE bei TT beginnt bereits bei höheren Anregungsleistungsdichten im Vergleich zu A-SL-ELO und B-SL-ELO. Somit gilt auch hier, um den tatsächlichen Einfluss eines Fehlschnittwinkels von  $0.2^\circ$  auf die Defektdichte und damit auf die IQE zu bestimmen, wäre es notwendig eine maximale IQE zu bestimmen. Letzteres ist mit dem derzeitigen PL-Aufbau nicht möglich.

## 6.4 Zusammenfassung

Serie 1			Serie 2		
Name	Fehlschnittwinkel	IQE	Name	Fehlschnittwinkel	IQE
A-ELO	$0.1^\circ m$	0,055	A-SL-ELO	$0.1^\circ m$	0,049
B-ELO	$0.1^\circ m^*$	0,054	B-SL-ELO	$0.1^\circ m^*$	0,033
C-ELO	$0.2^\circ m$	0,098	C-SL-ELO	$0.2^\circ m$	0,045

**Abbildung 6.20:** IQEs beider Serien bei einer Anregungsleistungsdichte von  $1300 \frac{kW}{cm^2}$ .

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Proben mit Übergitter eine eindeutig glattere Oberfläche aufweisen und damit einen wichtigen positiven Effekt für UVC-Laserdioden im Betrieb mit sich bringen. Die AFM-, SEM- und CL-Aufnahmen bestätigen, dass der Fehlschnittwinkel Einfluss auf die Wachstumskinetik hat. So ist in beiden Serien eindeutig der Einfluss der Fehlschnittrichtung zur Richtung der ELO-Streifen an der Oberflächenmorphologie zu erkennen. Auch Stufenbündelwachstum bei einem Fehlschnittwinkel von  $0.2^\circ$  hat sich bei Probe C-SL-ELO bestätigt. Ein positiver Einfluss auf die Defektdichte bei einem Fehlschnittwinkel von  $0.2^\circ$  ist bei alleiniger Betrachtung der IQE der Probe C-ELO, bei der beim MQW-Wachstum etwas schief lief, zwar zu bestätigen, hat sich bei tiefergehender Analyse nicht erhärtet und gezeigt, dass es für eine verwertbare Analyse noch weiterer Investigation bedarf. Die Probe C-SL-ELO dagegen verhält sich ohne Widersprüche und zeigt eine der höchsten IQEs, die auf dem Niveau der A-ELO und A-SL-ELO ist. Bestätigt allerdings auch bei genauerer Betrachtung, dass für einen verwertbaren Vergleich, die Bestimmung einer maximalen IQE nötig ist, da es scheint, als würde für die Proben mit  $0.2^\circ$ -Fehlschnittwinkel eine andere Absorption gelten. Es sei aber erwähnt, dass dies nur eine mögliche Erklärung darstellt

## KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

und die Gründe für die unterschiedlichen IQEs bei 5K auch bspw. in Wachstumsfehlern mit ungeklärtem Einfluss oder unterschiedlichen Ladungsträgertransportmechanismen bedingt durch die Morphologien liegen könnten. C-SL-ELO weist eine rauere Oberfläche auf, weswegen für eine Verwendung in UVC-Laserdioden die Ergebnisse für die Verwendung von Übergittern mit einem Fehlschnitt von  $0.1^\circ$  sprechen. Dies bestätigt sich ebenfalls in den Untersuchungen von Christian Kuhn, die zeigen, dass mit Übergitter gewachsene UVC-Laser eine Reduktion der Laserschwelldichte um einen Faktor zwei im Vergleich zu ohne Übergitter gewachsene UVC-Laser aufweisen [49].

KAPITEL 6. UNTERSUCHUNG OPTISCH GEPUMPTER  
LASERSTRUKTUREN AUF UNTERSCHIEDLICHEN TEMPLATES

---

# Kapitel 7

## Untersuchung der optischen Polarisation an AlGaN MQWs mit Photolumineszenzspektroskopie

### 7.1 Einleitung

Um die Polarisation und den Kreuzungspunkt der Simulationen von Christoph Reich experimentell zu überprüfen, wurden die Polarisation von zwei Probenserien mit Hilfe von Photolumineszenz-Spektroskopie untersucht. Die untersuchten Probenserien unterteilen sich in eine QW-Dicken-Variation (Serie A) und einer Serie mit Variation des Al-Gehalts (Serie B) in den QWs. Die Proben wurde alle bei Raumtemperatur (300K) untersucht und die Emission wurde aus der Kante der Probe gemessen um eine Absorption und Einfluss an der obersten Barriere zu vermeiden. Weil es möglicherweise Auswirkungen des ELO auf die Polarisation gibt, wurde der Einfluss des ELO mit untersucht.

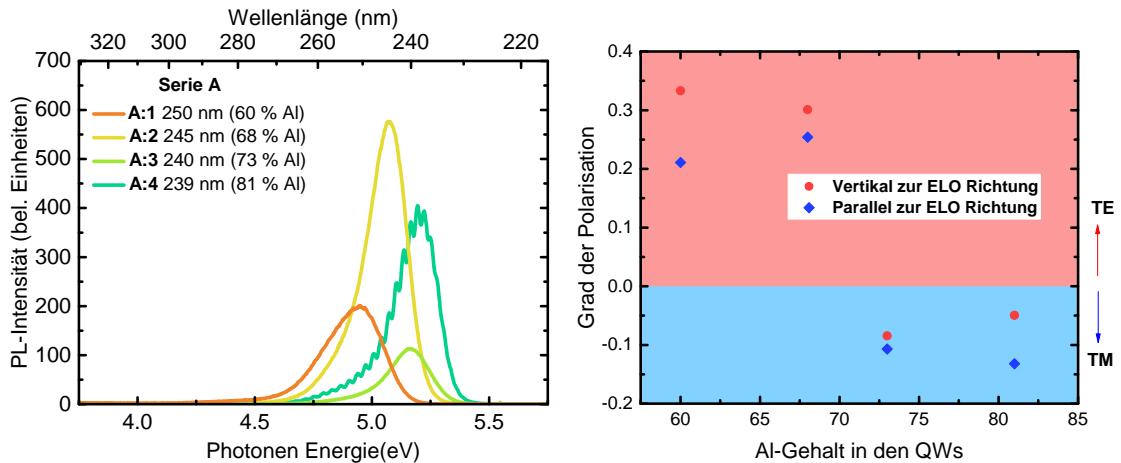
### 7.2 Variation des Al-Gehalts in den QWs

Die Untersuchung der Al-Variations Serie, dient dem Zweck, anhand eines variierenden Al-Gehalts in den QWs und einem festen Al-Gehalt in der Barriere den Übergang von TE zu TM (siehe Abb. [2.18] in Kapitel 2.10) bei fester QW-Dicke

## KAPITEL 7. UNTERSUCHUNG DER OPTISCHEN POLARISATION AN ALGAN MQWS MIT PHOTOLUMINESZENZSPEKTROSKOPIE

---

experimentell zu überprüfen. Dazu wurden vier Proben auf ELO-AlN gewachsen, mit einer darauf folgenden AlN(100%) Buffer-Schicht. Auf die Buffer-Schicht folgt zuletzt die aktiven Zone, mit einem zwischen der ersten und letzten undotierten AlN-Barriere eingebetteten dreifach  $Al_xGa_{1-x}N$  QWs mit einer Dicke von  $1,5\text{nm}$  und dazwischen AlN-Barrieren einer Dicke von  $5\text{nm}$ . Der Aluminium-Gehalt der QWs wurde variiert mit  $x = 60\%, 68\%, 73\%, 81\%$ . Der Einfluss des unterschiedlichen Al-Gehalts auf die Emissionsenergie ist in Abb. [7.1] zu erkennen. Die kleinste Wellenlänge hat Probe A:4 mit einem Al-Gehalt von 81%, die theoretisch ausreicht um im Vergleich mit den anderen Proben zumindest einen Abfall des Polarisationgrades der TE-Polarisation zu erkennen. Dazu wurden Proben verti-



**Abbildung 7.1:** PL-Spektren der Serie A. Die Emission verschiebt sich mit steigendem Al-Gehalt in den QWs hin zu kleineren Wellenlängen durch die steigende Bandlückenenergie.

**Abbildung 7.2:** Ergebnisse der Polarisationsmessungen an Serie A mit den Polarisationsgraden abhängig vom Al-Gehalt des QW und zusätzlich mit den Messwerten in Abhängigkeit der ELO-Richtung.

kal und horizontal zur ELO-Richtung positioniert und gemessen. Abbildung [7.2] zeigt die Ergebnisse der Polarisationsmessungen. So zeigen die Proben A:1 und A:2 mit einem Al-Gehalt von 60% und 68% TE-Polarisation. Der Grad der Polarisation ist zusätzlich noch abhängig von der Positionierung der ELO-Streifen. So haben die Proben A:1 und A:2 vertikal zur ELO-Richtung Polarisationsgrade von  $\rho = 0,33$  und  $\rho = 0,30$  und parallel zur ELO-Richtung deutlich geringe Polarisationsgrade mit  $\rho = 0,22$  und  $\rho = 0,25$ . Die Proben A:3 und A:4 mit 73% und 81% Al-Gehalt weisen TM-Polarisation auf mit Polarisationsgraden von  $\rho = -0,09$  und

## KAPITEL 7. UNTERSUCHUNG DER OPTISCHEN POLARISATION AN ALGAN MQWS MIT PHOTOLUMINESZENZSPEKTROSKOPIE

---

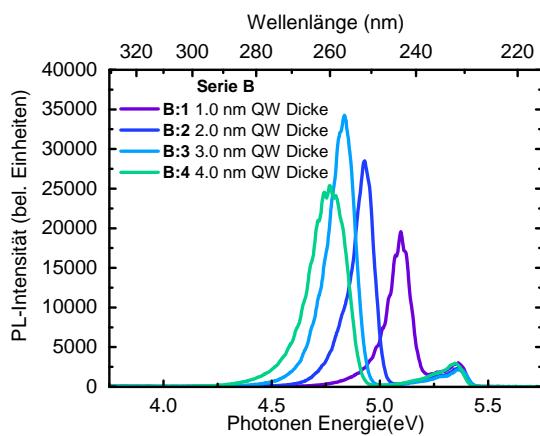
$\rho = -0,05$  vertikal zur ELO-Richtung und  $\rho = -0,11$  und  $\rho = -0,14$  parallel zur ELO-Richtung. Es zeigt sich demzufolge, dass die Polarisation sich mit steigendem Al-Gehalt von TE- hin zu TM-Polarisation ändert durch die Neuordnung der Valenzbänder. Der Wechsel findet bei einer Wellenlänge von ca.  $240\text{nm}$  statt und ist in guter Übereinstimmung mit den Simulation (siehe Abb. [2.18]). Überdies ist eine Abhängigkeit der Ausrichtung der ELO-Streifen zu beobachten. Mögliche Erklärungen wären, dass es durch Brechungsindexwechsel vom Freiraum des ELO zum Kristall, es zu Reflektion des emittierten Lichtes und damit zu Interferenzerscheinungen kommt oder das ELO beeinflusst die Verzerrung im Kristall so, dass die für die Simulation angenommene biaxiale Verzerrung nicht mehr zutrifft.

### 7.3 Variation der QW-Dicke

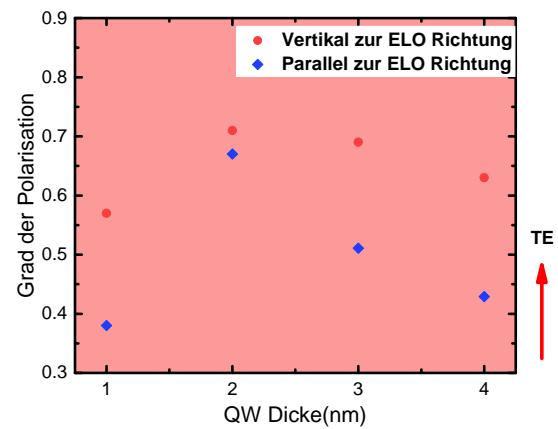
Die Untersuchung der QW-Dicken Variations Serie, dient dem Zweck, anhand der variierenden QW-Dicke bei einem festen Al-Gehalt in QW und Barriere die Änderung in der Polarisation(siehe Abb. 2.19 in Kapitel 2.10) experimentell zu überprüfen. Dazu wurden vier Proben auf ELO-AlN gewachsen, mit einer darauf folgenden AlN(100%) Buffer-Schicht. Auf die Buffer-Schicht folgt zuletzt die aktiven Zone, mit einem zwischen der ersten und letzten undotierten AlN-Barriere eingebetteten dreifach  $Al_{0.6}Ga_{0.4}N$  QWs und dazwischen  $Al_{0.81}Ga_{0.19}N$ -Barrieren einer Dicke von  $5\text{nm}$ . Der Einfluss des unterschiedlichen QW-Dicke auf die Emissionsenergie ist in Abb. [7.3] zu erkennen. Mit steigender QW-Dicke sinkt die Emissionsenergie und steigt die Wellenlänge aufgrund des QCSE und Confinements. Die Emission der Barriere ist mit steigender Dicke besser erkennbar. die Ergebnisse der Polarisationsmessung zeigen eine eindeutig dominante TE-Polarisation die auch abhängig von der ELO-Richtung ist. Die Probe B:2 zeigt die höchste TM-Polarisation mit einem Polarisationsgrad von  $\rho = +0,72$  vertikal zur ELO-Richtung. Es zeigt sich, wie in der Simulation in Abb. 2.19 zu sehen, dass mit einem Al-Gehalt von 60% in den QWs, der Polarisationsgrad bei den Proben mit 1 und  $4\text{nm}$  QW-Dicke am niedrigsten ausfällt und bei  $2\text{nm}$  am höchsten. Somit bestätigt der Verlauf die Simulationen in Bezug auf den zu erwartenden Trend, wo am Rand zum Wechsel (bei 1 und  $4\text{nm}$ ) von TE zu TM der geringste Polarisationsgrad zu erwarten ist.

## KAPITEL 7. UNTERSUCHUNG DER OPTISCHEN POLARISATION AN ALGAN MQWS MIT PHOTOLUMINESZENSPEKTROSKOPIE

---



**Abbildung 7.3:** PL-Spektren der Serie B. Die Emission verschiebt sich mit steigender QW-Dicke hin zu größeren Wellenlängen durch den QCSE und Confinement.



**Abbildung 7.4:** PL-Spektren der Serie B. Die Emission verschiebt sich mit steigendem Al-Gehalt in den QWs hin zu kleineren Wellenlängen durch die steigende Bandlückenenergie.

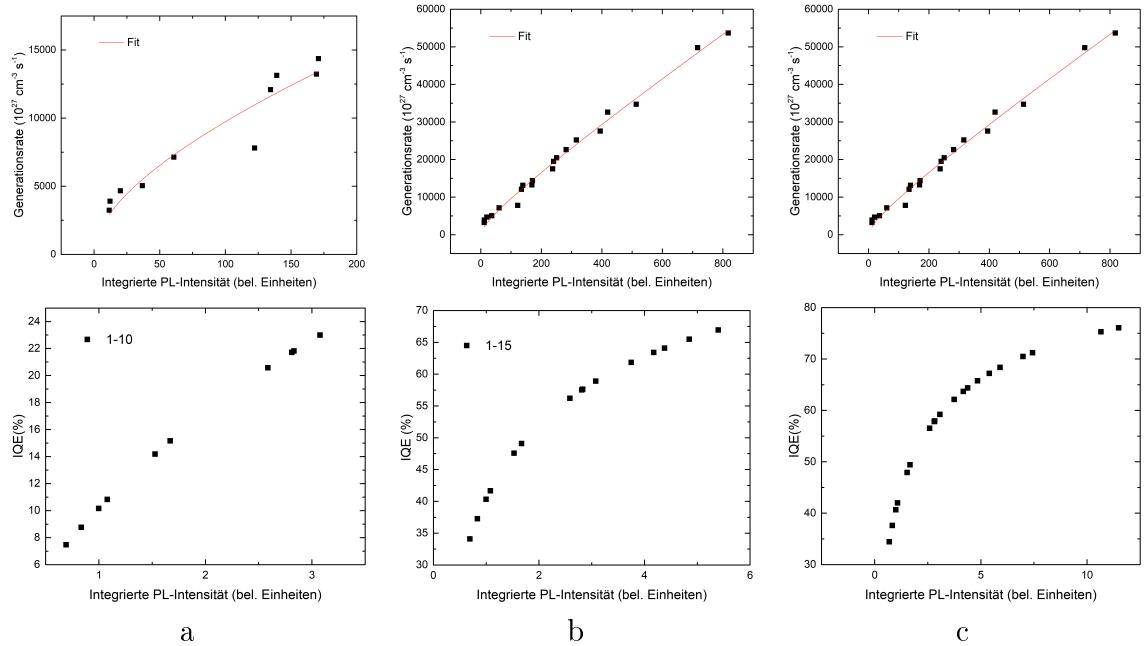
# Kapitel 8

## Bestimmung der IQE bei Raumtemperatur

In diesem Kapitel wird die in Kapitel vorgestellte Methode zur Bestimmung der IQE bei Raumtemperatur benutzt und versucht auf eine möglichst große Anzahl von uns gemessenen Proben anzuwenden. Um dies generisch und automatisiert zu verwirklichen und die Methode auf möglichst viele und auch alte Messungen anzuwenden, wurde von mir ein Mathematica-Skript geschrieben, dass die gemessenen Daten einer Probenserie bei Raumtemperatur benutzt, um die Ergebnisse in Echtzeit in Abhängigkeit von einem variablen Bereich der Messpunkte darzustellen. Dies erscheint wichtig, weil die Methode das ABC-Modell auf die Parameter A und B reduziert und somit möglichst ein Bereich ausgewählt werden sollte, bei dem der Einfluss der Auger-Rekombination gering ausfällt. Also muss insbesondere der Bereich geringer Anregungsleistungsdichten betrachtet werden, der allerdings mit unserem UVPL-Setup stark von Messartefakten und Rauschen beeinflusst ist. So zeigte sich, dass die Methode für keine Probenserie verlässliche Werte lieferte und stattdessen die Ergebnisse stark mit dem ausgewählten Bereich der Datenpunkte variierten. Das als Fazit nur zu sagen bleibt, dass die Methode für die Bestimmung der IQE unserer Proben als unbrauchbar beschrieben werden muss. Die große Schwankung in Abhängigkeit der ausgewählten Datenpunkte ist in Abbildung 8.1 zu sehen. Dieses Verhalten mit der starken Schwankung wiesen alle untersuchten Proben auf.

## KAPITEL 8. BESTIMMUNG DER IQE BEI RAUMTEMPERATUR

---



**Abbildung 8.1:** Der Fit der Generationsrate in Abhängigkeit der integrierten Intensität für die 1-5 (a), 1-10 (b) und 1-15 (c) Datenpunkte und darunter die aus dem Fit bestimmte IQE.

Des Weiteren sollte erwähnt werden, dass die zugehörigen A- und B-Parameter in keinem der Fälle in einem Bereich lagen, in dem sie nach Literaturwerten einzuordnen wären. Stattdessen schwankten sie variierend mit einigen Zehnerpotenzen darüber oder darunter. Nun soll auf einige Probleme des Ansatzes der angewandten Methode eingegangen werden. Die Methode setzt voraus, dass die Auger-Rekombination vernachlässigt werden kann, da nur Bereiche geringer Anregungsleistungsdichte betrachtet werden sollten. Die untersuchten Proben sind allerdings zu leuchtschwach, so dass eben in jenem Bereich die gemessenen Punkte unter starkem Rauschen leiden. Zusätzlich betrachtet die Methode den möglichen Einfluss einer Dotierung überhaupt nicht. Dies ist in Bezug auf unabsichtliche Hintergrunddotierungen nicht zu vernachlässigen wie in Kapitel 2.9 beschrieben. Einer weiterer wichtiger Punkt ist, dass mit dem von uns genutzten Setup keine Möglichkeit bestand, nur die QWs anzuregen und so die Effekte thermischer Diffusion ebenfalls nicht Rechnung getragen wird.

# Kapitel 9

## Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden PL-Untersuchungen an AlGaN UVC-Laser- und LED-Strukturen durchgeführt und deren IQE bestimmt. Diese wurde verglichen und die Ursachen für die Unterschiede mit Hilfe verschiedener Messmethoden wie AFM und CL versucht zu ergründen. Weiter wurde das Modell zur Bestimmung der IQE erweitert (Kapitel 4), in dem die Annahme es würde keine nicht-radiative Rekombination bei Tieftemperatur geben, fallen gelassen wurde. So findet Auger-Rekombination auch bei Tieftemperatur statt und hat durch die kubische Abhängigkeit von der Ladungsträgerdichte einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die IQE. Dies zeigte sich durch mit der Erweiterung einhergehenden deutliche Korrekturen der IQE die zu merklich geringeren Werten führte. Des Weiteren wurde der Einfluss verschiedener Effekte auf die Bestimmung der IQE besprochen und damit zusammenhängende Problematiken beschrieben. Wie bspw. die Überbandanregung die es nicht erlaubt resonant Anzuregen und zum Effekt der thermischen Diffusion führt.

In Kapitel 5 wurde das MQW-Design von AlGaN UVC-LED Heterostrukturen untersucht, in dem die IQEs zweier Probenserien mit und ohne dotierte Barrieren und je vier Proben untersucht und verglichen wurden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die QW-Dicke einen eindeutigen Einfluss auf die Rekombination und damit auf die IQE hat. Weiter zeigte sich der Einfluss dotierter Barrieren, so führen diese zu höheren IQEs im Bereich geringer Anregungsleistungsdichten. Die Messungen ergaben, dass QW-Dicken von  $1 - 2 \text{ nm}$  zu den höchsten IQEs führen. Die experi-

## KAPITEL 9. ZUSAMMENFASSUNG

---

mentell ermittelten Ergebnisse wurden von  $k \cdot p$ -Simulationen von Christoph Reich bestätigt.

Die Untersuchungen in Kapitel 6 widmeten sich der Untersuchung zweier Probenreihen von optisch gepumpten Laserstrukturen, die aus Rezepten aus zwei unterschiedlichen Serien stammen. Untersucht wurde der Einfluss des Fehlschnittwinkels des Substrates auf die beiden Serien, die sich beide darin unterscheiden, dass sie einmal mit und ohne Übergitter gewachsen wurden. Ziel der Untersuchungen war, den Einfluss des Fehlschnittwinkels auf die IQE zu untersuchen. Für eine tiefergehende Analyse wurden noch AFM und CL-Messungen betrachtet und analysiert und mit der IQE versucht in Zusammenhang zu bringen. So zeigte es sich, dass die Proben mit Übergitter eine eindeutig glattere Oberfläche aufweisen. Ein positiver Einfluss auf die Defektdichte bei einem Fehlschnittwinkel von  $0.2^\circ$  konnte dagegen nicht eindeutig geklärt werden. Dazu wurde nochmal auf die bestehenden Grenzen bei der Bestimmung der IQE eingegangen und erläutert. Das Fazit aller zusammengetragenen Untersuchungen war, dass die Ergebnisse für eine Verwendung von Übergittern mit einem Fehlschnitt von  $0.1^\circ$  sprechen.

Kapitel 7 widmete sich der Untersuchung der Polarisation und der experimentellen Überprüfung des Kreuzungspunktes der Simulationen von Christoph Reich. Dazu wurden die Polarisation von zwei Probenserien mit Hilfe von Photolumineszenz-Spektroskopie untersucht. Die untersuchten Probenserien unterteilen sich in eine QW-Dicken-Variation und einer Serie mit Variation des Al-Gehalts in den QWs. Es zeigte sich, dass die Polarisation sich mit steigendem Al-Gehalt von TE- hin zu TM-polarisierten Licht ändert. Der Wechsel findet bei einer Wellenlänge von ca.  $240\text{ nm}$  statt und ist in guter Übereinstimmung mit den Simulationen. Die Ergebnisse der Polarisationsmessungen bei variierender QW-Dicke und festem Al-Gehalt bestätigen der Verlauf die Simulationen in Bezug auf den zu erwartenden Trend, wo am Rand zum Wechsel (bei 1 und  $4\text{ nm}$ ) von TE zu TM der geringste Polarisationsgrad zu erwarten ist.

# Kapitel 10

## Danksagung

Hier möchte ich allen Personen danken ohne die diese Masterarbeit nicht möglich gewesen wäre.

- Prof. Dr. Michael Kneissl danke ich für die Möglichkeit diese Arbeit anzufertigen und die Bereitstellung einer sehr gut ausgestatteten Labor- und Arbeitsumgebung.
- Prof. Dr. Axel Hoffmann danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens.
- Ein besonderer Dank gilt Christoph Reich für die Betreuung der Masterarbeit. Die fachliche Unterstützung und Beantwortung vieler Fragen erleichterte mir das anfertigen dieser Arbeit ungemein. Ich danke ihm für seine Geduld.
- Ich danke Bettina Belde für die Betreuung und fachliche Unterstützung.
- Ich danke Johannes Enslin für die bereitgestellten Proben und Antworten auf vieler fachlichen Fragen.
- Ich danke Christian Kuhn für das bereitstellen der Proben und der Klärung vieler fachlicher Fragen
- Ich danke meiner Freundin Tamara Lachynova für das Korrekturlesen und der Unterstützung während der Zeit des Anfertigens dieser Arbeit

## KAPITEL 10. DANKSAGUNG

---

- Ich danke Martin Guttman für die fachliche Unterstützung in der Thematik zur Polarisation

# Literaturverzeichnis

- [1] “Presse veröffentlichung der königlich schwedische akademie der wissenschaften.” <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/press-release/>. Accessed: 2018-10-08.
- [2] M. Kneissl and J. Rass, *III-Nitride Ultraviolet Emitters*. Springer Series in Materials Science, Springer International Publishing, 2016.
- [3] W. Risk, T. Gosnell, and A. Nurmikko, *Compact Blue-Green Lasers*. Cambridge studies in modern optics, Cambridge University Press, 2003.
- [4] Shuji, Nakamura, Takashi, and Mukai, “Candela-class high-brightness ingan / aigan double-heterostructure bluelight-emitting,” 1999.
- [5] I. Akasaki, “High efficiency blue led utilizing gan film with aln buffer layer grown by movpe,” *Inst. Phys. Conf. Ser.*, vol. 91, pp. 633–636, 1988.
- [6] S. Vilhunen, H. Särkkä, and M. Sillanpää, “Ultraviolet light-emitting diodes in water disinfection,” *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 16, pp. 439–442, Jun 2009.
- [7] M. Kneissl, T. Kolbe, C. Chua, V. Kueller, N. Lobo, J. Stellmach, A. Knauer, H. Rodriguez, S. Einfeldt, Z. Yang, N. M. Johnson, and M. Weyers, “Advances in group iii-nitride-based deep uv light-emitting diode technology,” *Semiconductor Science and Technology*, vol. 26, no. 1, p. 014036, 2011.
- [8] T. Lalinský, I. Rýger, G. Vanko, M. Tomáška, I. Kostič, S. Haščík, and M. Vallo, “Algan/gan based saw-hemt structures for chemical gas sensors,” *Procedia Engineering*, vol. 5, pp. 152 – 155, 2010. Eurosensor XXIV Conference.

## LITERATURVERZEICHNIS

---

- [9] C. Reich. Persönliche Kommunikation.
  - [10] J. Piprek, *Nitride semiconductor devices: principles and simulation*. John Wiley & Sons, 2007.
  - [11] M. Feneberg, R. A. R. Leute, B. Neuschl, K. Thonke, and M. Bickermann., “High-excitation and high-resolution photoluminescence spectra of bulk aln,” *Phys. Rev. B*, vol. 82:075208, no. 2, 2000.
  - [12] S. R. Lee, A. F. Wright, M. H. Crawford, G. A. Petersen, J. Han, and R. M. Biefeld, “The band-gap bowing of algan alloys,” *Applied Physics Letters*, vol. 74, no. 22, pp. 3344–3346, 1999.
  - [13] C. Buchheim, *Dielektrische Funktion und elektrooptische Eigenschaften von (Al,Ga)N/GaN - Heterostrukturen*. PhD thesis, Technische Universität Ilmenau, 2010.
  - [14] U. W. Pohl, *Epitaxy of Semiconductors: Introduction to Physical Principles*. Graduate Texts in Physics, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
  - [15] O. Ambacher, J. Majewski, C. Miskys, M. H. A. Link, M. Eickhoff, M. Stutzmann, F. B. Matthias, V. Fiorentini, V. Tilak, B. Schaff, and L. Eastmann, “Pyroelectric properties of al(in)gan/gan hetero- and quantum well structures,” *Journal of Physics: Condensed Mater*, vol. 82:075208, no. 14:3399, 2002.
  - [16] J. Takatsu, R. Fuji, J. Tatebayashi, D. Timmerman, A. Lesage, T. Gregoriewicz, and Y. Fujiwara, “Growth and optical characteristics of tm-doped algan layer grown by organometallic vapor phase epitaxy,” *Journal of Applied Physics*, vol. 123, no. 16, p. 161406, 2018.
  - [17] U. Zeimer, V. Kueller, A. Knauer, A. Mogilatenko, M. Weyers, and M. Kneissl, “High quality algan grown on elo aln/sapphire templates,” vol. 377, p. 32–36, 08 2013.
  - [18] A. Mogilatenko, V. Küller, A. Knauer, J. Jeschke, U. Zeimer, M. Weyers, and G. Tränkle, “Defect analysis in algan layers on aln templates obtained by epitaxial lateral overgrowth,” *Journal of Crystal Growth*, vol. 402, pp. 222 – 229, 2014.
-

## LITERATURVERZEICHNIS

---

- [19] V. Küller, *Versetzungsrreduzierte AlN- und AlGaN-Schichten als Basis für UV LEDs*. PhD thesis, Technische Universität Berlin, 2014.
  - [20] M. Imura, K. Nakano, G. Narita, N. Fujimoto, N. Okada, K. Balakrishnan, M. Iwaya, S. Kamiyama, H. Amano, I. Akasaki, T. Noro, T. Takagi, and A. Bandoh, “Epitaxial lateral overgrowth of aln on trench-patterned aln layers,” *Journal of Crystal Growth*, vol. 298, pp. 257 – 260, 2007. Thirteenth International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (ICMOVPE XIII).
  - [21] T. Wunderer, C. L. Chua, Z. Yang, J. E. Northrup, N. M. Johnson, G. A. Garrett, H. Shen, and M. Wraback, “Pseudomorphically grown ultraviolet c photopumped lasers on bulk aln substrates,” *Applied Physics Express*, vol. 4, no. 9, p. 092101, 2011.
  - [22] T. Wunderer, C. L. Chua, J. E. Northrup, Z. Yang, N. M. Johnson, M. Kneissl, G. A. Garrett, H. Shen, M. Wraback, B. Moody, H. S. Craft, R. Schlessner, R. F. Dalmau, and Z. Sitar, “Optically pumped uv lasers grown on bulk aln substrates,” *physica status solidi c*, vol. 9, no. 3-4, pp. 822–825.
  - [23] J. Yun, J.-I. Shim, and H. Hirayama, “Analysis of efficiency droop in 280-nm algan multiple-quantum-well light-emitting diodes based on carrier rate equation,” *Applied Physics Express*, vol. 8, no. 2, p. 022104, 2015.
  - [24] K. Ban, J. ichi Yamamoto, K. Takeda, K. Ide, M. Iwaya, T. Takeuchi, S. Kamiyama, I. Akasaki, and H. Amano, “Internal quantum efficiency of whole-composition-range algan multiquantum wells,” *Applied Physics Express*, vol. 4, no. 5, p. 052101, 2011.
  - [25] J. Hader, J. Moloney, B. Pasenow, S. Koch, M. Sabathil, N. Linder, and S. Lutgen, “On the importance of radiative and auger losses in gan-based quantum wells,” *Applied Physics Letters*, vol. 92, no. 26, 2008.
  - [26] Y. C. Shen, G. O. Mueller, S. Watanabe, N. F. Gardner, A. Munkholm, and M. R. Krames, “Auger recombination in ingan measured by photoluminescence,” *Applied Physics Letters*, vol. 91, no. 14, p. 141101, 2007.
-

## LITERATURVERZEICHNIS

---

- [27] A. Laubsch, M. Sabathil, W. Bergbauer, M. Strassburg, H. Lugauer, M. Peter, S. Lutgen, N. Linder, K. Streubel, J. Hader, J. V. Moloney, B. Pasenow, and S. W. Koch, “On the origin of iqe-‘droop’ in ingan leds,” *physica status solidi c*, vol. 6, no. S2, pp. S913–S916.
  - [28] E. Kioupakis, P. Rinke, K. T. Delaney, and C. G. Van de Walle, “Indirect auger recombination as a cause of efficiency droop in nitride light-emitting diodes,” *Applied Physics Letters*, vol. 98, no. 16, p. 161107, 2011.
  - [29] E. F. Schubert, *Light Emitting Diodes, Second Edition*. Cambridge University Press, 2006.
  - [30] Q. Dai, M. F. Schubert, M. H. Kim, J. K. Kim, E. F. Schubert, D. D. Koleske, M. H. Crawford, S. R. Lee, A. J. Fischer, G. Thaler, and M. A. Banas, “Internal quantum efficiency and nonradiative recombination coefficient of gainn/gan multiple quantum wells with different dislocation densities,” *Applied Physics Letters*, vol. 94, no. 11, p. 111109, 2009.
  - [31] Z. Bryan, I. Bryan, J. Xie, S. Mita, Z. Sitar, and R. Collazo, “High internal quantum efficiency in algan multiple quantum wells grown on bulk aln substrates,” *Applied Physics Letters*, vol. 106, no. 14, p. 142107, 2015.
  - [32] C. Reich, M. Guttmann, M. Feneberg, T. Wernicke, F. Mehnke, C. Kuhn, J. Rass, M. Lapeyrade, S. Einfeldt, A. Knauer, V. Kueller, M. Weyers, R. Goldhahn, and M. Kneissl, “Strongly transverse-electric-polarized emission from deep ultraviolet algan quantum well light emitting diodes,” *Applied Physics Letters*, vol. 107, no. 14, p. 142101, 2015.
  - [33] M. Guttmann. Persönliche Kommunikation.
  - [34] S. Wei and A. Zunger, “Valence band splittings and band offsets of aln, gan, and inn,” *Applied Physics Letters*, vol. 69, no. 18, pp. 2719–2721, 1996.
  - [35] M. Feneberg, M. F. Romero, M. Röppischer, C. Cobet, N. Esser, B. Neuschl, K. Thonke, M. Bickermann, and R. Goldhahn, “Anisotropic absorption and emission of bulk (1 $\bar{1}$ 00) aln,” *Phys. Rev. B*, vol. 87, p. 235209, Jun 2013.
-

## LITERATURVERZEICHNIS

---

- [36] R. Ishii, A. Kaneta, M. Funato, Y. Kawakami, and A. A. Yamaguchi, "All deformation potentials in gan determined by reflectance spectroscopy under uniaxial stress: Definite breakdown of the quasicubic approximation," *Phys. Rev. B*, vol. 81, p. 155202, Apr 2010.
  - [37] Y. Taniyasu and M. Kasu, "Origin of exciton emissions from an aln p-n junction light-emitting diode," *Applied Physics Letters*, vol. 98, no. 13, p. 131910, 2011.
  - [38] J. E. Northrup, C. L. Chua, Z. Yang, T. Wunderer, M. Kneissl, N. M. Johnson, and T. Kolbe, "Effect of strain and barrier composition on the polarization of light emission from algan/alm quantum wells," *Applied Physics Letters*, vol. 100, no. 2, p. 021101, 2012.
  - [39] H. Kawanishi, E. Niikura, M. Yamamoto, and S. Takeda, "Experimental energy difference between heavy- or light-hole valence band and crystal-field split-off-hole," *Applied Physics Letters*, vol. 89, no. 25, p. 251107, 2006.
  - [40] T. K. Sharma, D. Naveh, and E. Towe, "Strain-driven light-polarization switching in deep ultraviolet nitride emitters," *Phys. Rev. B*, vol. 84, p. 035305, Jul 2011.
  - [41] C. Reich, *Photolumineszenzspektroskopie an (In)AlGaN-Heterostrukturen für UV-Emitter*. PhD thesis, Technische Universität Berlin, 2011.
  - [42] J. F. Archard and A. M. Taylor, "Improved glan-foucault prism," *Journal of Scientific Instruments*, vol. 25, no. 12, p. 407, 1948.
  - [43] F. Nippert, S. Y. Karpov, G. Callsen, B. Galler, T. Kure, C. Nenstiel, M. R. Wagner, M. Straßburg, H.-J. Lugauer, and A. Hoffmann, "Temperature-dependent recombination coefficients in ingan light-emitting diodes: Hole localization, auger processes, and the green gap," *Applied Physics Letters*, vol. 109, no. 16, p. 161103, 2016.
  - [44] F. Nippert, M. Tollabi Mazraehno, M. J. Davies, M. P. Hoffmann, H.-J. Lugauer, T. Kure, M. Kneissl, A. Hoffmann, and M. R. Wagner, "Auger recombination in aln/alm heterostructures," *Applied Physics Letters*, vol. 109, no. 16, p. 161104, 2016.
-

## LITERATURVERZEICHNIS

---

- nation in algan quantum wells for uv light-emitting diodes,” *Applied Physics Letters*, vol. 113, no. 7, p. 071107, 2018.
- [45] N. Grandjean, B. Damilano, S. Dalmasso, M. Leroux, M. Laügt, and J. Massies, “Built-in electric-field effects in wurtzite algan/gan quantum wells,” *Journal of Applied Physics*, vol. 86, no. 7, pp. 3714–3720, 1999.
- [46] F. Mehnke., *Design, Epitaxie und Charakterisierung AlGaN-basierter Leuchtdioden mit Emissionswellenlängen unterhalb von 250 nm*. PhD thesis, Technische Universität Berlin, 2017.
- [47] C. Kuhn, T. Simoneit, M. Martens, T. Markurt, J. Enslin, F. Mehnke, K. Bellmann, T. Schulz, M. Albrecht, T. Wernicke, and M. Kneissl, “Movpe growth of smooth and homogeneous al<sub>0.8</sub>ga<sub>0.2</sub>n:si superlattices as uvc laser cladding layers,” *physica status solidi (a)*, vol. 215, no. 13, p. 1800005.
- [48] T. Simoneit, *Masterarbeit: Epitaxie und Charakterisierung von pseudomorph verspannten AlGaN-Quantenfilm Laserdioden für den UV-C Spektralbereich*. PhD thesis, Technische Universität Berlin, 2016.
- [49] C. Kuhn, T. Simoneit, M. Martens, T. Markurt, J. Enslin, F. Mehnke, K. Bellmann, T. Schulz, M. Albrecht, T. Wernicke, and M. Kneissl, “Movpe growth of smooth and homogeneous al<sub>0.8</sub>ga<sub>0.2</sub>nsi superlattices as uvc laser cladding layers,” *physica status solidi (a)*, vol. 215, no. 13, p. 1870032.